



Bestätigungsvermerk

**Jahresabschluss  
zum 31. Dezember 2011  
und Lagebericht**

**Süss MicroTec AG**  
Garching



## Bilanz zum 31. Dezember 2011

S\_2011\_80026567\_1338655



**Süss MicroTec AG  
Garching**

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011**

	<b>2011</b>	<b>2010</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
1. Umsatzerlöse	7.757.959,07	7.275.383,48
2. Sonstige betriebliche Erträge	4.192.671,43	9.478.532,28
	<b>11.950.630,50</b>	<b>16.753.915,76</b>
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.318.636,37	-2.584.098,72
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 8.895,58; Vorjahr € 168.280,96)	-256.201,10	-395.598,07
	<b>-2.574.837,47</b>	<b>-2.979.696,79</b>
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.381.474,18	-1.258.037,38
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.060.179,57	-7.610.038,11
6. a) Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	11.262.631,27	0,00
b) Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	-331.354,57
c) Erträge aus Beteiligungen	0,00	562.555,58
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen € 920.012,45; Vorjahr € 1.798.644,20)	2.081.272,60	2.437.225,78
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-472.478,47	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen € 138.487,80; Vorjahr € 101.926,77)	-991.139,91	-867.358,30
	<b>1.438.631,74</b>	<b>-7.067.007,00</b>
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>10.814.424,77</b>	<b>6.707.211,97</b>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-953.221,48	-292.577,00
12. Sonstige Steuern	-98.923,78	-197.741,41
<b>13. Jahresüberschuss</b>	<b>9.762.279,51</b>	<b>6.216.893,56</b>
14. Verlustvortrag aus Vorjahr	-11.812.698,87	-18.029.592,43
<b>15. Bilanzverlust</b>	<b>-2.050.419,36</b>	<b>-11.812.698,87</b>



## **A. Allgemeine Angaben**

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Ergänzende Bilanzierungsvorschriften aus der Satzung bestehen nicht.

Die Süss MicroTec AG, nachstehend auch „Gesellschaft“ genannt, weist zum Abschluss-Stichtag die Größenmerkmale einer großen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 3 Satz 2 HGB auf.

## **B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**

Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden im Einzelnen folgende Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze angewandt:

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen erfolgen linear und monatsgenau über die voraussichtliche Nutzungsdauer, wobei diese für Software drei bzw. fünf Jahre beträgt. Die Bemessung der Abschreibungen der anderen Anlagen sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung erfolgt unter Zugrundelegung einer Nutzungsdauer von drei bis fünf Jahren. Der Abschreibungszeitraum richtet sich nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Einzelanschaffungskosten bis EUR 410 netto werden nach § 6 Abs. 2 EStG im Jahr der Anschaffung sofort abgeschrieben.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen werden mit den Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Ausleihungen an verbundene Unternehmen werden mit dem Nennwert bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt. Einzel- oder Pauschalwertberichtigungen waren nicht erforderlich. Zum 31. Dezember 2006 wurde unter den sonstigen Vermögensgegenständen erstmals das langfristige Körperschaftsteuerguthaben in Folge des Gesetzes über steuerliche Begleitmaßnahmen zur Einführung der Europäischen Gesellschaft und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften (SESTEG) in Höhe von TEUR 87 aktiviert. Im Geschäftsjahr 2008 wurden auf Grund der Ergebnisse der Betriebsprüfung weitere TEUR 69 aktiviert. Das Guthaben wird in zehn gleichen Jahresbeträgen in den Jahren 2008 bis 2017 ausbezahlt. Da der Auszahlungsbetrag unverzinslich ist, erfolgte eine entsprechende Abzinsung. Dabei wurde ein durchschnittlicher Effektivzinssatz von 4,37 % p.a. zugrunde gelegt.

Wertpapiere werden zu Anschaffungskosten bzw. niedrigeren beizulegenden Werten am Bilanzstichtag bewertet.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält Ausgaben, die Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach dem Stichtag darstellen.

In Anlehnung an internationale Rechnungslegungsvorschriften wird der Wert der gewährten Aktienoptionen im Personalaufwand und in der Kapitalrücklage nach § 272 Abs. 2 Nr. 2 HGB erfasst. Die entsprechende Dotierung wird zeitanteilig über den Leistungszeitraum von zwei bzw. fünf Jahren gemäß den bestehenden Aktienoptionsplänen verteilt.

Die Pensionsverpflichtungen wurden mit dem nach versicherungsmathematischen Grundsätzen (Anwartschaftsbarwertverfahren) ermittelten Erfüllungsbetrag gemäß § 253 Abs. 1 HGB unter Zugrundelegung der Richttafeln von Dr. Klaus Heubeck (2005 G) und eines Zinssatzes von 5,14 % p.a. ermittelt. Das Deckungsvermögen wurde bei der Saldierung gemäß § 246 Abs. 2 HGB mit dem Zeitwert in Höhe von EUR 26.520 berücksichtigt.

**Süss MicroTec AG, Garching**  
**Anhang für das Geschäftsjahr 2011**

Die Rückstellung für Altersteilzeit wurde nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelt. Der entsprechende Aktivwert wurde bei der Saldierung gemäß § 246 Abs. 2 HGB mit dem Zeitwert in Höhe von EUR 73.819 berücksichtigt.

Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Aufwendungen und Erträge der Gesellschaft sind entsprechend ihrer wirtschaftlichen Verursachung dem jeweiligen Geschäftsjahr zugeordnet.

Zur Umrechnung von Fremdwährungspositionen in der Bilanz wurden die am Bilanzstichtag gültigen mittleren Devisenkurse verwendet. Bei langfristigen Fremdwährungspositionen wurde das Imparitätsprinzip beachtet. Sofern die Gründe für eine vorgenommene Fremdwährungsabwertung nicht mehr bestehen, erfolgt eine Zuschreibung entsprechend dem Wertaufholungsgebot.

**C. Erläuterungen und Angaben zu einzelnen Posten des Jahresabschlusses**

Die Zusammensetzung und Entwicklung der in der Bilanz erfassten Anlagegegenstände einschließlich der Abschreibungen im Geschäftsjahr sind dem in der Anlage zum Anhang enthaltenen Anlagenspiegel zu entnehmen.



**Süss MicroTec AG, Garching**  
**Anhang für das Geschäftsjahr 2011**

Der Anteilsbesitz stellt sich zum Bilanzstichtag wie folgt dar:

	Buchwerte				Eigenkapital	Beteiligungs- quote	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag Geschäftsjahr 2011	
	01.01.2011	Zugänge	Abgänge/ Abschreibungen	31.12.2011			Währung	Betrag
	EUR		EUR	EUR		%		
Süss MicroTec Lithography GmbH, Garching *	30.416.489,04	0,00	0,00	30.416.489,04	61.168.527,53	100,00%	EUR	10.221.025,64
Süss MicroOptics S.A., Neuchatel, Schweiz	288.331,08	0,00	0,00	288.331,08	6.243.301,97	85,00%	CHF	2.311.059,88
Süss MicroTec KK, Yokohama, Japan	50.038,34	0,00	0,00	50.038,34	-256.533.347,00	100,00%	JPY	39.817.571,00
Süss MicroTec Ltd., Coventry, Großbritannien	1.842.813,47	0,00	-392.813,47	1.450.000,00	1.140.788,07	100,00%	GBP	-30.127,27
Süss MicroTec S.A.S., Lyon, Frankreich	67.151,79	0,00	0,00	67.151,79	720.783,00	100,00%	EUR	265.345,00
Süss MicroTec Inc., Sunnyvale, USA	23.010.289,78	0,00	0,00	23.010.289,78	21.000.329,85	100,00%	USD	-16.018.305,78
Süss MicroTec REMAN GmbH, Oberschleißheim*	28.121,05	0,00	0,00	28.121,05	1.247.477,69	100,00%	EUR	1.041.605,63
Süss MicroTec Company Ltd., Bangkok, Thailand	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	--	49,00%	THB	--
Süss MicroTec (Taiwan) Company Ltd., Hsin Chu, Taiwan	135.531,36	0,00	0,00	135.531,36	130.272.316,00	100,00%	TWD	39.873.949,00
Süss MicroTec Company Ltd., Shanghai, China	190.240,65	0,00	0,00	190.240,65	16.810.531,57	100,00%	CNY	8.773.162,48
Süss MicroTec (Singapore) Pte Ltd., Singapur	12.725,88	0,00	0,00	12.725,88	1.391.171,92	100,00%	SGD	1.144.279,57
Süss MicroTec Korea Co Ltd., Seoul, Korea	28.436,14	0,00	0,00	28.436,14	587.675.273,00	100,00%	KRW	281.098.347,00
HamaTech APE GmbH & Co KG, Sternenfels	1,00	0,00	0,00	1,00	-1.462.949,51	100,00%	EUR	2.815.652,38
HamaTech APE Beteiligungs GmbH, Sternenfels	1,00	0,00	0,00	1,00	17.631,64	100,00%	EUR	-911,52
<b><u>mittelbare Beteiligungen:</u></b>								
SüssMicroTec Precision Photomask Inc., Palo Alto					792.207,26	100,00%	USD	-1.105.908,15
HUGLE Lithography Inc., San Jose					-39.579,00	53,00%	USD	-1.800,00
<b>Gesamt</b>	<b>56.095.170,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-417.813,47</b>	<b>55.677.357,11</b>				

\* Jahresüberschuss / -fehlbetrag und Eigenkapital vor Ergebnisabführung

Im Jahresabschluss angewandte Umrechnungskurse für Bilanz und GuV-Posten:

	2011	
	Bilanz	GuV
1 EUR vs 1 USD	1,2937	1,3944
1 EUR vs 1 JPY	100,1000	111,1485
1 EUR vs 1 GBP	0,8369	0,8707
1 EUR vs 1 CHF	1,2164	1,2337
1 EUR vs 1 TWD	39,3375	41,1005
1 EUR vs 1 SGD	1,6816	1,7502
1 EUR vs 1 CNY	8,2337	9,0163
1 EUR vs 1 KRW	1.495,6700	1.544,8646
1 EUR vs 1 THB	40,7750	42,8504

**Süss MicroTec AG, Garching**  
**Anhang für das Geschäftsjahr 2011**

In den Konzessionen, gewerblichen Schutzrechten und ähnlichen Rechten und Werten ist das geleaste SAP-System mit einem Restbuchwert von EUR 960.943 (2010: EUR 1.847.967) enthalten.

Die Gesellschaft hat in 2007 unter der Führung der UniCredit (HVB) ein Schuldscheindarlehen in Höhe von insgesamt EUR 9.000.000 platziert. Das Schuldscheindarlehen besteht aus drei Platzierungen in Höhe von jeweils EUR 3.000.000, wobei eines mit 6 % verzinst wird und zwei eine variable Verzinsung haben. Der Unterschiedsbetrag zwischen dem passivierten Rückzahlungsbetrag und dem Auszahlungsbetrag in Höhe von EUR 90.000 wurde unter dem Rechnungsabgrenzungsposten als Disagio nach § 250 Abs. 3 S. 1 HGB aktiviert. Das Disagio wird über die Laufzeit des Schuldscheindarlehens aufgelöst und beträgt zum 31.12.2011 EUR 16.500 (31.12.2010: EUR 36.000).

Zur Finanzierung des neu erworbenen Betriebsgrundstücks in Sternenfels hat die SÜSS MicroTec AG am 25./28. Mai 2010 einen Darlehensvertrag mit einer lokalen Bank abgeschlossen. Das Darlehen beläuft sich auf EUR 4.500.000 und hat eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2020. Es wurde am 6. Juli 2010 valutiert und zur Auszahlung gebracht. Zum 31.12.2011 beträgt der Buchwert des Darlehens EUR 4.320.000,00.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden 379.990 Bezugsrechte aus Aktienoptionsplänen ausgeübt.

Das Gezeichnete Kapital beträgt zum Bilanzstichtag EUR 19.101.028 und ist in 19.101.028 auf den Namen lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Gezeichneten Kapital von EUR 1,00 eingeteilt.

Am 31. Dezember 2011 verfügt die Gesellschaft über ein genehmigtes Kapital in Höhe von EUR 9.052.863 (31.12.2010: EUR 2.552.863) und über ein bedingtes Kapital in Höhe von insgesamt EUR 1.270.010 (31.12.2010: EUR 1.694.842).

#### **Entwicklung des bedingten Kapitals**

	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2010</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Bedingtes Kapital 2002/II	0	44.842
Bedingtes Kapital 2005/I	750.000	750.000
Bedingtes Kapital 2008/I	520.010	900.000
<b>Gesamt</b>	<b>1.270.010</b>	<b>1.694.842</b>

#### **Bedingtes Kapital 2002/II**

Das bedingte Kapital 2002/II wurde gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2011 aufgehoben.

#### **Bedingtes Kapital 2005/I**

Auf der Hauptversammlung am 21. Juni 2005 wurde die Schaffung eines bedingten Kapitals 2005/I in Höhe von EUR 750.000 beschlossen. Es dient zur Gewährung von Bezugsrechten an Vorstands- bzw. Geschäftsführungsmitglieder und weitere Führungskräfte der Konzerngesellschaften (Aktienoptionsplan 2005). Aus diesem Teil des bedingten Kapitals wurden bis zum 31. Dezember 2011 insgesamt 749.800 Bezugsrechte ausgegeben.

### **Bedingtes Kapital 2008/I**

Aus dem Aktienoptionsprogramm 2008 wurden im Geschäftsjahr insgesamt 379.990 Bezugsrechte ausgeübt. Durch die Ausübung verringerte sich das Bedingte Kapital 2008/I auf EUR 520.010. Das bedingte Kapital 2008/I dient der Ausgabe von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstandes der Gesellschaft, Mitglieder der Geschäftsführung von verbundenen Unternehmen und Mitarbeitern der Gesellschaft sowie der verbundenen Unternehmen. Aus diesem Teil des bedingten Kapitals sind bis zum 31.12.2011 noch 58.260 Bezugsrechte ausgegeben.

### **Kapitalrücklage und Jahresüberschuss**

Im Geschäftsjahr 2011 wurden 379.990 Aktienoptionen ausgeübt. In diesem Zusammenhang wurden der Kapitalrücklage EUR 113.997 zugeführt. Im Rahmen der bestehenden Aktienoptionspläne wurden der Kapitalrücklage aus der Gewährung von Bezugsrechten EUR 46.641 (31.12.2010: EUR 186.562) ergebniswirksam als Personalaufwand zugeführt. Die Zuführungsbeträge für die Aktienoptionen errechnen sich aus dem Zeitwert der Optionen im Zeitpunkt der Ausgabe. Sie werden der Kapitalrücklage ratierlich über den Leistungszeitraum zugeführt. Der Zeitwert wird mit Hilfe der Black & Scholes – Methode ermittelt.

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr einen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 9.762.280 (2010: EUR 6.216.894) erzielt. Die Kapitalrücklage beträgt zum Bilanzstichtag insgesamt EUR 82.152.901 (31.12.2010: EUR 81.992.263).

### **Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:**

	<b>31.12.2011 EUR</b>	<b>31.12.2010 EUR</b>
Drohende Verluste aus Devisentermingeschäften und Zinsswaps	349.736	501.148
Personalrückstellungen	624.039	861.397
Ausstehende Rechnungen	339.945	1.068.220
Jahresabschlusskosten	104.100	116.000
Aufsichtsratsvergütung	151.500	160.500
<b>Gesamt</b>	<b>1.569.320</b>	<b>2.707.265</b>

### **Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten betragen:**

	<b>Gesamtbetrag EUR</b>	<b>Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR</b>	<b>Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren EUR</b>	<b>Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren EUR</b>
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.320.011	9.180.011	720.000	3.420.000
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	220.034	220.034	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	15.324.565	7.594.798	7.729.767	0
Sonstige Verbindlichkeiten	1.044.647	959.896	84.751	0
<b>Gesamt</b>	<b>29.909.257</b>	<b>17.954.739</b>	<b>8.534.518</b>	<b>3.420.000</b>

**Süss MicroTec AG, Garching**  
**Anhang für das Geschäftsjahr 2011**

In den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ist ein Darlehen zur Finanzierung des Betriebsgrundstücks in Sternenfels enthalten. Die Risiken des variablen Zinssatzes werden durch einen Zinsswap eliminiert. Die gegenläufigen Wertveränderungen gleichen sich aus. Zum Stichtag betrug der nicht bilanzierte Marktwert des Zinsswaps TEUR -277 (2010: TEUR -11).

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind im Wesentlichen die Verbindlichkeiten aus der Sale and Lease Back-Transaktion der SAP-Anlage enthalten.

### **Umsatzerlöse**

Die Umsatzerlöse betreffen die Weiterberechnung der bei der Süss MicroTec AG entstandenen Aufwendungen an die Unternehmen der Süss Gruppe.

#### **Aufgliederung der Umsatzerlöse nach Tätigkeitsbereichen und Regionen:**

<b>Region</b>	<b>Mgmt- verrechnung EUR</b>	<b>Marketing- verrechnung EUR</b>	<b>Versicherungs- verrechnung EUR</b>	<b>Sonstige EUR</b>
Deutschland	2.741.129	396.528	274.659	1.832.694
EU	48.485	3.812	-610	29.506
Amerika	819.148	138.175	45.930	112.037
Japan	181.375	45.629	4.511	0
Asien	673.891	7.758	17.065	195.141
Sonstige	163.003	17.734	10.359	0
<b>Gesamt</b>	<b>4.627.031</b>	<b>609.636</b>	<b>351.914</b>	<b>2.169.378</b>

Die unter der Spalte „Sonstige“ ausgewiesenen Umsatzerlöse enthalten im Wesentlichen die Weiterbelastung von SAP Aufwendungen in Höhe von EUR 1.555.661 sowie die Weiterbelastung von Währungsverlusten aus Devisentermingeschäften in Höhe von EUR 155.269.

### **Sonstige betriebliche Erträge**

Im Wesentlichen ist diese Position durch Fremdwährungsgewinne in Höhe von EUR 1.854.149 (2010: EUR 3.951.579) und durch Mieterlöse in Höhe von EUR 976.581 (2010: EUR 645.602) geprägt. Darüber hinaus sind hier Gewinne aus der Veräußerung der Cascade-Aktien in Höhe von EUR 833.729 erfasst.

### **Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Im Wesentlichen beinhaltet diese Position Fremdwährungsverluste in Höhe von EUR 3.561.288,90 (2010: EUR 1.477.748).

### **Erträge aus Gewinnabführungsverträgen**

Die ausgewiesenen Erträge resultieren aus dem zum 01.01.2011 gültigen Ergebnisabführungsvertrag mit der Süss MicroTec Lithography GmbH, Garching, und dem am 24. April 2008 abgeschlossenen Ergebnisabführungsvertrag mit der Süss MicroTec REMAN GmbH, Oberschleißheim.

### **Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**

Im Berichtsjahr fielen Abschreibungen auf Finanzanlagen in Höhe von EUR 392.813 (2010: EUR 0) an. Die Konzernplanung sieht bei der Süss MicroTec Ltd., Großbritannien, einen Umsatzrückgang für 2012 sowie voraussichtlich stark schwankende Umsätze für die Folgejahre vor. Entsprechend zeigt das zur Überprüfung der Werthaltigkeit von Finanzanlagen verwendete Modell eine Abwertung auf den Beteiligungsansatz an dieser Gesellschaft um TEUR 393 an.

#### **D. Derivative Finanzinstrumente und Bewertungseinheiten**

Derivative Finanzinstrumente werden innerhalb der Süss MicroTec AG zum Zweck der Absicherung von Zinsänderungsrisiken für ein Immobiliendarlehen sowie für zwei Schuldscheindarlehen eingesetzt. Darüber hinaus schließt die Gesellschaft Währungstermingeschäfte ab. Sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, werden Finanzinstrumente mit dem abgesicherten Grundgeschäft zu einer Bewertungseinheit zusammengefasst.

Bei der Bildung von Bewertungseinheiten werden die Zahlungsströme aus dem Grund- und Sicherungsgeschäft einander gegenübergestellt und nur ein negativer Überhang aus dem ineffektiven Teil der Marktwertveränderungen zurückgestellt. Die unrealisierten Gewinne und Verluste aus dem effektiven Teil gleichen sich vollständig aus und werden weder bilanziell noch ergebniswirksam erfasst.

Die Bilanzierung von derivativen Finanzinstrumenten, für die keine Bewertungseinheit mit dem Grundgeschäft gebildet wird, erfolgt dagegen imparitätisch. Somit werden für negative Marktwerte Rückstellungen gebildet, positive Marktwerte werden nicht angesetzt.

##### **Derivative Finanzinstrumente mit Bildung von Bewertungseinheiten**

Ein im Geschäftsjahr 2010 aufgenommenes Darlehen, das der Finanzierung des Grundstückstücks in Sternenfels dient, weist einen variablen Zins aus. Zur Absicherung des Zinsänderungsrisikos wurde ein laufzeitkongruenter Zinsswap abgeschlossen. Zum Stichtag beträgt der nicht bilanzierte Marktwert TEUR -277 (2010: TEUR -11).

##### **Derivative Finanzinstrumente ohne Bildung von Bewertungseinheiten**

Die Süss MicroTec AG schließt Währungstermingeschäfte ab, um das Wechselkursrisiko aufgrund eingehender Zahlungen aus Warenlieferungen und Darlehenstilgungen in japanischen Yen und US-Dollar abzusichern.

Zum Bilanzstichtag beläuft sich das Volumen an Fremdwährungstermingeschäften auf Verträge über insgesamt EUR 3.545.441 für den Verkauf von USD 3.000.000 und JPY 100.000.000 im Zeitraum von Januar 2012 bis April 2012. Der beizulegende Marktwert der USD-Termingeschäfte beträgt zum Bilanzstichtag EUR 2.697.899, der beizulegende Marktwert der JPY-Termingeschäfte EUR 995.899.

Die Gesellschaft hat im Jahr 2007 Zinsswaps abgeschlossen, um die zwei variabel verzinsten Schuldscheindarlehen abzusichern. Die Swapzinssätze betragen 6,06 % bzw. 6,17 % und haben eine Laufzeit bis Dezember 2012.

Für drohende Verluste aus abgeschlossenen Devisentermingeschäften und der Zinsswaps wurde zum Bilanzstichtag eine Rückstellung in Höhe von EUR 349.736 gebildet.

Die Bewertung der offenen Devisentermingeschäfte und der Zinsswaps erfolgte mit den zum Stichtag gültigen Terminbewertungskursen der Banken. Währungstermingeschäfte für Spekulationszwecke werden nicht eingesetzt.

#### **E. Beziehungen zu verbundenen Unternehmen und Beteiligungsunternehmen**

Die Süss MicroTec AG mit Sitz in Garching ist Konzernobergesellschaft.

Bezüglich der Angaben zu den Konzerngesellschaften verweisen wir auf unsere Ausführungen im Abschnitt C.

## **F. Sonstige Angaben**

Der Vorstand der Gesellschaft setzte sich im Geschäftsjahr 2011 wie folgt zusammen:

**Frank Averdung**, Diplom-Elektroingenieur, Feldkirchen, Vorstandsvorsitzender

Zuständigkeitsbereiche: Vertrieb, Marketing, Produktion, Forschung und Entwicklung, Arbeitssicherheit, Qualitätsmanagement, Umweltschutz, Patentwesen und Konzernstrategie, Investor Relations

**Michael Knopp**, Diplom-Kaufmann, Ratingen, Mitglied des Vorstands

Zuständigkeitsbereiche: Finanz- und Rechnungswesen, Informatik, Recht, Steuern und Versicherungen, Personal, Facility Management, Materialwirtschaft und Logistik

Die Bezüge des Vorstandes enthalten fixe und variable Bestandteile. Als fixe Vergütung erhalten die Vorstandsmitglieder monatliche Gehaltszahlungen, Zuschüsse zur Sozialversicherung sowie einen Firmenwagen mit privater Nutzungsmöglichkeit.

Als variable Vergütung erhalten die Vorstandsmitglieder einen Jahresbonus, der sich an individuell festgelegten Zielen orientiert.

Die Bezüge bestehen zudem aus einer variablen Vergütungskomponente mit langfristiger, renditeorientierter Anreizwirkung in Form eines Aktienoptionsplans.

Die gesamte Barvergütung des Vorstands betrug im Geschäftsjahr EUR 657.263 (2010: EUR 828.196). Neben dem bezogenen Fixgehalt (einschließlich der Zuschüsse zur Sozialversicherung und dem geldwerten Vorteil aus der privaten Nutzung des Firmenfahrzeugs) wurden Herrn Averdung und Herrn Knopp insgesamt EUR 189.550 bzw. EUR 151.640 aus der zum Vorjahresstichtag gebildeten Rückstellung für den variablen Gehaltsbestandteil ausgezahlt. Für den Jahresbonus 2011 von Herrn Averdung und Herrn Knopp wurde im Geschäftsjahr eine Rückstellung von EUR 151.057 gebildet.

Im Berichtsjahr wurden an Herrn Averdung und Herrn Knopp keine Bezugsrechte auf Aktien der Gesellschaft ausgegeben.

Die Vergütungen teilen sich wie folgt auf die einzelnen Vorstandsmitglieder auf:

	2011		2010	
<b>Barvergütung (in EUR)</b>	<b>Herr Averdung</b>	<b>Herr Knopp</b>	<b>Herr Averdung</b>	<b>Herr Knopp</b>
Fixkomponente	272.169	234.037	267.399	223.297
Erfolgsabhängige Komponente	82.096	68.961	187.500	150.000
<b>Summe</b>	<b>354.265</b>	<b>302.998</b>	<b>454.899</b>	<b>373.297</b>

	2011		2010	
	<b>Aktien</b>	<b>Optionen</b>	<b>Aktien</b>	<b>Optionen</b>
Herr Averdung	82.000	0	42.500	67.500
Herr Knopp	35.000	41.400	37.500	97.500

**Süss MicroTec AG, Garching**  
**Anhang für das Geschäftsjahr 2011**

Für Pensionsverpflichtungen gegenüber einem ehemaligen Vorstandsmitglied der Gesellschaft besteht eine Pensionsrückstellung in Höhe von EUR 6.563 (31.12.2010: EUR 6.629).

Der Aufsichtsrat hat sich im Berichtsjahr wie folgt zusammengesetzt:

**Dr. Stefan Reineck**, Kirchardt, Geschäftsführender Gesellschafter der RMC Dr. Reineck Management & Consulting GmbH, Aufsichtsratsvorsitzender

weitere Mandate:        AttoCube Systems AG, München (Vorsitzender des Aufsichtsrats)  
                             NanoScape AG, München (Vorsitzender des Aufsichtsrats)  
                             Bosch Solar CISTech GmbH, Brandenburg an der Havel (Mitglied im Beirat)  
                             Phoseon Technology Inc., Hillsboro, Oregon, USA (Mitglied im Board of Directors)  
                             Wittenstein AG, Igersheim (Mitglied im Aufsichtsrat)

**Jan Teichert**, Metten, Mitglied des Vorstands der Einhell Germany AG, Landau / Isar; stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats

weitere Mandate:        keine

**Gerhard Pegam**, Au bei Bad Aibling, Vorstandsvorsitzender der EPCOS AG, München (bis 31.01.2012); im Aufsichtsrat seit 21. Juni 2011

Weitere Mandate:        TDK-EPC Corporation, Tokio, Japan (Mitglied des Board of Directors, bis 31.01.2012)  
                             OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon, Schweiz (Mitglied des Verwaltungsrats)  
                             Folgende Tochtergesellschaften der EPCOS AG:

- EPCOS (Shanghai) Ltd., Shanghai, Volksrepublik China (Vorsitzender des Board of Directors, bis 31.01.2012)
- EPCOS (China) Investment Ltd., Shanghai, Volksrepublik China (Vorsitzender des Board of Directors, bis 31.01.2012)
- EPCOS Limited, Hong Kong, Volksrepublik China (Vorsitzender des Board of Directors, bis 31.01.2012)
- EPCOS Inc., Iselin, New Jersey, USA (Vorsitzender des Board of Directors, bis 31.01.2012)
- Becromal S.p.A., Mailand, Italien (Vorsitzender des Board of Directors, bis 31.01.2012)
- Becromal Iceland ehf, Akureyri, Island (Vorsitzender des Board of Directors, bis 31.01.2012)

**Sebastian Repegather**, Zürich, Investment Director bei der Fidinam S.A., Lugano, Schweiz (im Aufsichtsrat bis 21. Juni 2011)

weitere Mandate:        Sterling Strategic Value Limited, Tortola, British Virgin Islands (Mitglied im „Board of Directors“)  
                             International Equity Development S.L., Barcelona, Spanien (Mitglied der Geschäftsführung)

**Süss MicroTec AG, Garching**  
**Anhang für das Geschäftsjahr 2011**

Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält außer dem Ersatz seiner ihm bei Wahrnehmung seines Amtes entstandenen Auslagen eine feste Vergütung pro Geschäftsjahr. Gemäß der Satzungsänderung vom 23. Juni 2010 erhält der Vorsitzende des Aufsichtsrats EUR 45.000 p.a., sein Stellvertreter EUR 40.000 p.a. und jedes weitere Mitglied des Aufsichtsrats EUR 35.000 p.a. Gehört ein Mitglied dem Aufsichtsrat nur einen Teil des Geschäftsjahres an, bestimmt sich die Vergütung pro rata temporis. Darüber hinaus erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats ein Sitzungsgeld in Höhe von EUR 1.500 für die Teilnahme an einer Sitzung des Aufsichtsrats oder eines seiner Ausschüsse.

Der Aktienbesitz des Aufsichtsrats setzt sich für das Geschäftsjahr 2011 wie folgt zusammen:

<b>Aktienbesitz des Aufsichtsrates</b>	<b>Aktienanzahl</b>		<b>Bezugsrechte</b>	
	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2010</b>
Dr. Stefan Reineck	9.600	9.600	40.000	40.000
Jan Teichert	0	0	0	0
Sebastian Reppegather (bis 21.06.2011)	0	0	0	0
Gerhard Pegam (ab 21.06.2011)	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Süss MicroTec AG für das Geschäftsjahr 2011 werden im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gegeben.

Die Süss MicroTec AG stellt in Anwendung von § 315a HGB einen Konzernabschluss nach IFRS auf. Der Konzernabschluss und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2011 werden im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht.

#### **G. Latente Steuern**

Zum 31. Dezember 2011 besteht ein Überhang an aktiven latenten Steuern, der gemäß dem Ansatzwahlrecht nach § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB nicht aktiviert wurde. Die aktiven latenten Steuern sind auf unterschiedliche Ansätze im Bereich der Drohverlustrückstellungen, Altersteilzeit- und Pensionsrückstellungen zurückzuführen. Weiterhin entfallen aktive latente Steuern auf den steuerlichen Verlustvortrag. Zudem ergeben sich aktive und passive latente Steuern auf Abweichungen in den Bilanzposten der HamaTech APE GmbH & Co. KG, die in Höhe der Körperschaftsteuer und des Solidaritätszuschlags bei der Süss MicroTec AG zu berücksichtigen sind. Der Steuersatz für die Ermittlung der latenten Steuern beträgt 28,25 %.

#### **H. Honorare des Abschlussprüfers**

Wir verweisen bezüglich der Honorare des Abschlussprüfers gemäß § 285 Nr.17 HGB auf den Konzernabschluss der Gesellschaft.

#### **I. Zahl der Beschäftigten**

Die Süss MicroTec AG hatte im Geschäftsjahr 2011 durchschnittlich 20 Arbeitnehmer (2010: 19). Es handelt sich um Mitarbeiter im Verwaltungsbereich.



## **J. Sonstige finanzielle Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse**

### **Sonstige finanzielle Verpflichtungen**

Die Süss MicroTec AG hat Mietverpflichtungen in Höhe von EUR 207.000 für ein weiteres Jahr gegenüber der Süss MicroTec Lithography GmbH. Es bestehen Leasingverpflichtungen in Höhe von EUR 84.594 gegenüber Dritten bis zum Jahr 2015. Zudem hat die Gesellschaft einen Sale and Lease Back Vertrag für das implementierte SAP-System abgeschlossen. Hieraus ergibt sich eine finanzielle Verpflichtung in Höhe von EUR 1.003.987 bis Januar 2013.

### **Verbindlichkeiten aus Bürgschaften**

Die von dem Bankenkonsortium unter Führung der BayernLB bereitgestellte Kreditlinie in Höhe von 6 Mio. EUR lief bis zum 31. März 2011. Mit Kreditvertrag vom 30./31. März 2011 wurden neue Kreditverträge mit dem bisherigen Bankenkonsortium abgeschlossen. Mit den neuen Kreditverträgen wurde die Kreditlinie auf insgesamt 8 Mio. EUR erhöht. Die neue Kreditlinie hat eine Laufzeit bis zum 31. März 2012 und wurde ohne Covenants gestellt. Sie dient in erster Linie der Unterlegung von Anzahlungsbürgschaften.

Mit Vertrag vom 1. April / 5. April 2011 haben die SÜSS MicroTec AG und die SUSS MicroTec Lithography GmbH mit der DZ BANK AG einen Rahmenkreditvertrag abgeschlossen, mit dem eine Kreditlinie in Höhe von EUR 2 Mio. gestellt wird. Die Kreditlinie läuft bis zum 31. März 2012 und wurde ohne Covenants gestellt. Sie dient in erster Linie der Unterlegung von Anzahlungsbürgschaften.

Zum Bilanzstichtag ist die Linie in Höhe von TEUR 2.879 in Form von Avalen genutzt. Zur Sicherung der Kredit- und Avallinie wurde der Bestand an Forderungen aus Lieferungen und Leistungen der Süss MicroTec Lithography GmbH abgetreten.

Für 2012 ist geplant, Kreditverträge mit einem auf drei Banken ausgelegten Bankenkonsortium unter Führung der BayernLB abzuschließen, um die für die Unterlegung von Anzahlungsbürgschaften notwendigen Kreditlinien auch weiterhin zur Verfügung zu haben. Die Verhandlungen sind bereits weit fortgeschritten. Die neuen Verträge werden voraussichtlich Ende März 2012 abgeschlossen werden.

Die Gesellschaft hat eine Rückbürgschaft für einen Kautionsversicherungsvertrag der Tochtergesellschaften Süss MicroTec Lithography GmbH und Süss MicroTec REMAN GmbH übernommen. Der Bürgschaftsrahmen dieses Kautionsversicherungsvertrages beläuft sich auf EUR 2.500.000. Der Kautionsversicherungsvertrag läuft bis auf weiteres. Zum Bilanzstichtag ist die Linie nicht genutzt. Zur Sicherung dieser Linie hat die Süss MicroTec AG ein Festgeldkonto bei der UniCredit (HVB) in Höhe von EUR 350.000 an die Versicherungsgesellschaft abgetreten.

### **Patronatserklärungen und Garantien**

Im Mai 2010 hat die HamaTech APE GmbH & Co. KG mit der BW Bank Mannheim einen Rahmenkreditvertrag abgeschlossen, mit dem eine Kreditlinie in Höhe von EUR 1 Mio. gestellt wird. Die Kreditlinie läuft auf unbestimmte Zeit und wurde ohne Covenants gestellt. Die SÜSS MicroTec AG hat zur Besicherung der Kreditlinie eine harte Patronatserklärung für die HamaTech APE GmbH & Co. KG abgegeben.

Zur Absicherung von Kreditlinien der Süss MicroTec S.A.S. bei der Credit Agricole in Höhe von insgesamt EUR 200.000 hat die Süss MicroTec AG für die Overdraft-Fazilität in Höhe von EUR 200.000 eine Patronatserklärung abgegeben.

Für die finanzielle Absicherung der Unternehmensfortführung der Süss MicroTec (Singapore) Pte Ltd., Singapur, hat die Süss MicroTec AG eine Garantieerklärung abgegeben, die ihre Gültigkeit behält solange sie nicht widerrufen wird.

Für die finanzielle Absicherung der Unternehmensfortführung der Süss MicroTec S.A.S., Frankreich, hat die Süss MicroTec AG eine Garantieerklärung abgegeben, die ihre Gültigkeit behält solange sie nicht widerrufen wird.

Für die finanzielle Absicherung der Unternehmensfortführung der Süss MicroTec KK, Japan, hat die Süss MicroTec AG eine Garantieerklärung für den Zeitraum von einem Jahr bis zum 25. Januar 2013 abgegeben.

**Süss MicroTec AG, Garching**  
**Anhang für das Geschäftsjahr 2011**

Für die finanziellen Verpflichtungen der HamaTech APE GmbH & Co. KG hat die Süss MicroTec AG eine harte Patronatserklärung bis zum 30. September 2012 abgegeben.

Aufgrund der nachhaltig positiven Ertragslage der Gesellschaften rechnen wir nicht mit einer Inanspruchnahme aus den abgegebenen Garantien und Patronatserklärungen.

**K. Mitteilungen nach WpHG**

Im Geschäftsjahr wurden gegenüber der Gesellschaft folgende Mitteilungen gemäß § 21 Abs. 1 WpHG i.V.m. § 32 Abs. 2 InvG gemacht:

Die Süssvest SCS, Strassen, Luxemburg, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 13. Januar 2011 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 11. Januar 2011 die Schwelle von 3 % unterschritten hat und zu diesem Tag 2,3078 % beträgt (432.049 Stimmrechte).

Die Stichting Vest, Amsterdam, Niederlande, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 13. Januar 2011 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 11. Januar 2011 die Schwelle von 3 % unterschritten hat und zu diesem Tag 2,3078 % beträgt (432.049 Stimmrechte). Davon sind der Stichting Vest 2,3078 % (432.049 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen.

Die Crest Capital S.A., Strassen, Luxemburg, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 Satz 1 WpHG am 13. Januar 2011 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 11. Januar 2011 die Schwelle von 3 % unterschritten hat und zu diesem Tag 2,3078 % beträgt (432.049 Stimmrechte). Davon sind der Crest Capital S.A. 2,3078 % (432.049 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen.

Die Union Investment Privatfonds GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 1. Februar 2011 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 1. Februar 2011 die Schwelle von 3 % unterschritten hat und zu diesem Tag 2,94 % beträgt (550.000 Stimmrechte).

Die Credit Suisse Fund Management S.A, Luxemburg, Luxemburg, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 4. März 2011 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 18. Februar 2011 die Schwelle von 3 % überschritten hat und zu diesem Tag 3,35 % beträgt (627.435 Stimmrechte). Davon sind ihr 0,99 % (185.380 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG zuzurechnen

Die Capital Group International, Inc., Los Angeles, USA, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 7. März 2011 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 18. März 2003 die Schwelle von 5 % unterschritten hat und zu diesem Tag 4,85 % beträgt (724.695 Stimmrechte). 4,85 % (724.695 Stimmrechte) sind ihr nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 und Satz 3 WpHG zuzurechnen.

Die Capital Guardian Trust Company, Los Angeles, USA, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 14. März 2011 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 18. März 2003 die Schwelle von 5 % unterschritten hat und zu diesem Tag 4,68 % beträgt (698.495 Stimmrechte). 4,68 % (698.495 Stimmrechte) sind ihr nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG zuzurechnen.

Die Universal Investment Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main, Deutschland, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 und § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG am 25. Oktober 2011 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 24. Oktober 2011 die Schwelle von 3 % überschritten hat und zu diesem Tag 3,08 % beträgt (587.056 Stimmrechte). Davon sind ihr 2,66 % (507.356 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG zuzurechnen.

Die Universal Investment Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main, Deutschland, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 und § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG am 21. Februar 2012 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 20. Februar 2012 die Schwelle von 3 % unterschritten hat und zu diesem Tag 2,54 % beträgt (486.093 Stimmrechte). Davon sind ihr 2,28 % (436.843 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG zuzurechnen.

**L. Angabe der Erklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex nach § 161 AktG**

Wie bereits in den Vorjahren haben Vorstand und Aufsichtsrat im Juli 2011 eine Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG abgegeben und erklärt, dass sie den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 26. Mai 2010 mit fünf Ausnahmen – Einladung zur Hauptversammlung / Stimmrechtsvertreter, Briefwahl / Stimmrechtsvertreter, Selbstbehalt bei der D&O-Versicherung, Bildung von Ausschüssen und Vergütung von Aufsichtsratsmitgliedern – entsprochen haben und entsprechen werden.

Die Entsprechenserklärung wurde im Internet unter [www.suss.com](http://www.suss.com) dauerhaft zugänglich gemacht.

Garching, 12. März 2012

Frank Averdung  
Vorsitzender des Vorstandes

Michael Knopp  
Vorstand



Anlagenspiegel Süss MicroTec AG, Garching, 2011

	Historische Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte	
	01.01.2011 €	Zugänge €	Abgänge €	31.12.2011 €	01.01.2011 €	Zugänge €	Abgänge €	31.12.2011 €	31.12.2011 €	31.12.2010 €
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>										
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.746.758,95	577.002,55	1,00	6.323.760,50	3.027.900,51	1.136.977,32	1,00	4.164.876,83	2.158.883,67	2.718.858,44
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>5.746.758,95</b>	<b>577.002,55</b>	<b>1,00</b>	<b>6.323.760,50</b>	<b>3.027.900,51</b>	<b>1.136.977,32</b>	<b>1,00</b>	<b>4.164.876,83</b>	<b>2.158.883,67</b>	<b>2.718.858,44</b>
1. Grundstücke, grundstückähnliche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.627.751,45	350.195,63	0,00	4.977.947,08	115.695,98	152.281,30	0,00	267.977,28	4.709.969,80	4.512.055,47
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	719.293,15	125.746,99	0,00	845.040,14	428.399,51	92.215,56	0,00	520.615,07	324.425,07	290.893,64
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	38.550,00		38.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.550,00
	<b>5.385.594,60</b>	<b>475.942,62</b>	<b>38.550,00</b>	<b>5.822.987,22</b>	<b>544.095,49</b>	<b>244.496,86</b>	<b>0,00</b>	<b>788.592,35</b>	<b>5.034.394,87</b>	<b>4.841.499,11</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>										
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	75.499.469,66	0,00	153.718,89	75.345.750,77	19.404.299,08	392.813,47	128.718,89	19.668.393,66	55.677.357,11	56.095.170,58
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	13.626.369,27	4.822.530,86	477.467,55	17.971.432,58	8.859.916,61	0,00	0,00	8.859.916,61	9.111.515,97	4.766.452,66
	<b>89.125.838,93</b>	<b>4.822.530,86</b>	<b>631.186,44</b>	<b>93.317.183,35</b>	<b>28.264.215,69</b>	<b>392.813,47</b>	<b>128.718,89</b>	<b>28.528.310,27</b>	<b>64.788.873,08</b>	<b>60.861.623,24</b>
	<b>100.258.192,48</b>	<b>5.875.476,03</b>	<b>669.737,44</b>	<b>105.463.931,07</b>	<b>31.836.211,69</b>	<b>1.774.287,65</b>	<b>128.719,89</b>	<b>33.481.779,45</b>	<b>71.982.151,62</b>	<b>68.421.980,79</b>



# Konzernlagebericht und Lagebericht der SÜSS MicroTec AG für das Geschäftsjahr 2011

## Geschäft und Rahmenbedingungen

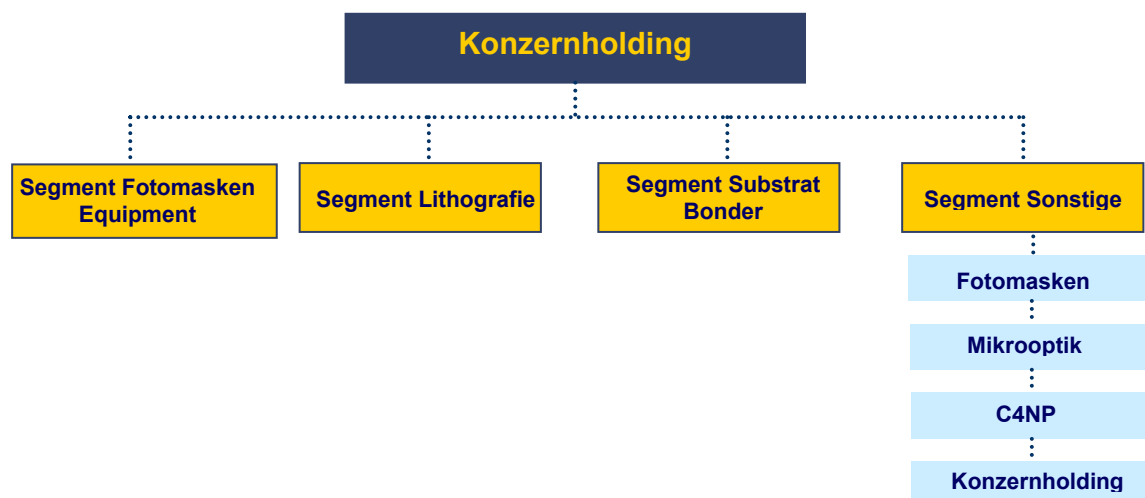
### Konzernstruktur und Geschäftstätigkeit

#### Geschäftstätigkeit und Geschäftsfelder

Der SÜSS MicroTec-Konzern entwickelt, fertigt und vertreibt Anlagen für die Herstellung von Mikroelektronik und Mikrosystemtechnik. Als Zulieferer von Systemlösungen für die Halbleitertechnik ist die Gruppe als leistungsstarker Partner der Halbleiterindustrie für den Labor- und den Produktionsbereich tätig. Wachstumsstarke Spezialmärkte bilden die Tätigkeitsschwerpunkte und fördern die innovative Technologieentwicklung mit langfristigem Erfolgspotenzial für zukunftsorientierte Märkte und Anwendungen. Im Mittelpunkt stehen die Aufbau- und Verbindungstechnik von Mikrochips bei Anwendungen in der Chipfertigung, der Telekommunikation und der optischen Datenübertragung.

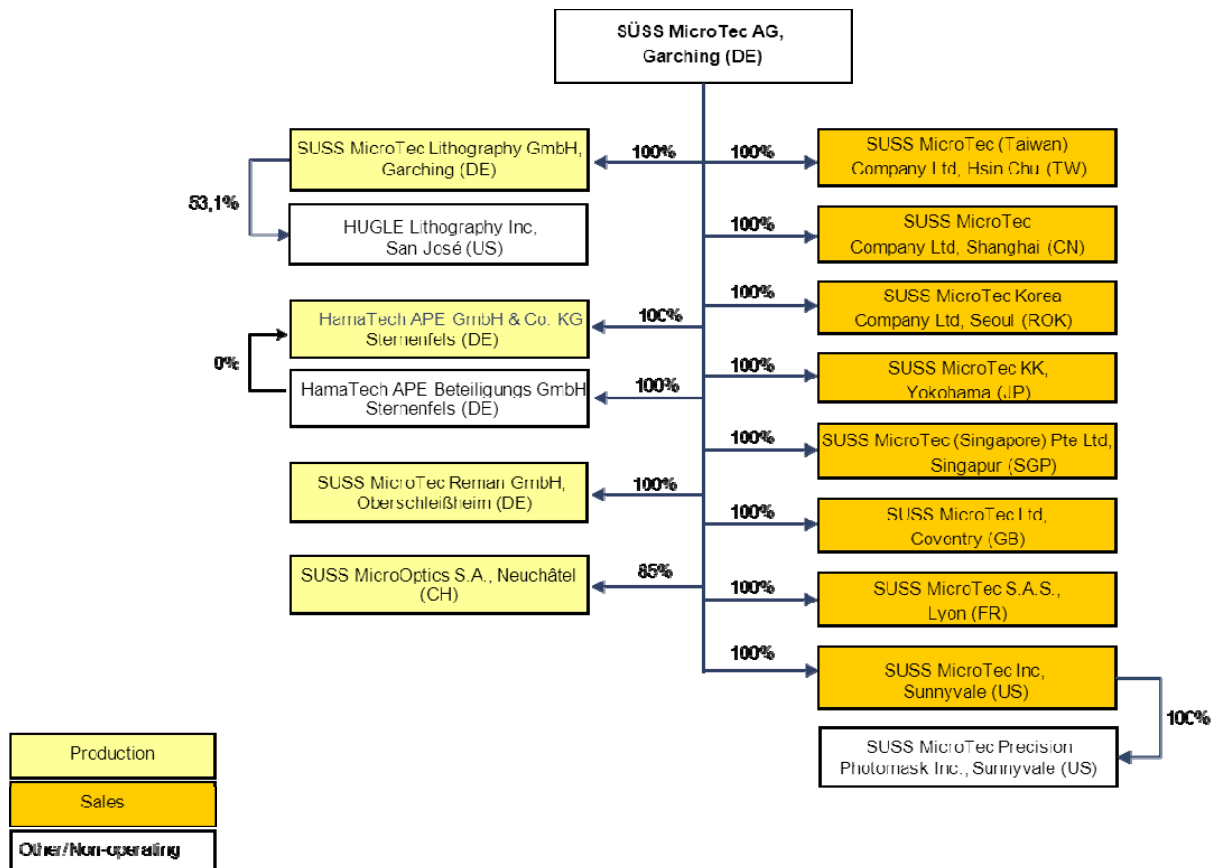
Größere Prozesslinien bestehen in der Regel aus mehreren Einzelgeräten, wo die SÜSS MicroTec Gruppe mit internen und externen Partnern Netzwerke zur Schaffung von Wettbewerbsvorteilen bildet und nutzt.

Der Konzern ist zum 31. Dezember 2011 in vier Segmente eingeteilt, wobei das Segment „Sonstige“ aus mehreren kleineren Teileinheiten besteht, die jeweils getrennt geleitet werden. Durch die Akquisition der HamaTech APE wurde im Geschäftsjahr 2010 ein neues Segment – Fotomasken Equipment - geschaffen.



## Rechtliche Konzernstruktur

Die rechtliche Konzernstruktur besteht aus der Muttergesellschaft, der SÜSS MicroTec AG als Management- und Finanzierungsholding, sowie den in der Regel mehrheitlich in Besitz der Muttergesellschaft stehenden Tochtergesellschaften. In den Tochtergesellschaften sind jeweils Entwicklungs- und Produktionstätigkeiten oder auch lokale Vertriebstätigkeiten für den Konzern organisiert. Die Gruppe verfügt über Standorte in Deutschland, den USA, Großbritannien, Frankreich, der Schweiz, Japan, China, Singapur, Korea und Taiwan.



Daneben besteht noch eine geringfügige Beteiligung von 10 % an der ELECTRON MEC S.R.L., Mailand (IT). Diese geringfügige Beteiligung hat nur unwesentliche Bedeutung für das operative Geschäft des Konzerns.



## Leitung und Kontrolle

### *Vergütungsstruktur für die Organmitglieder*

Der Vorstand erhält für seine Tätigkeit eine monatliche Festvergütung sowie eine variable Vergütung, die bei Erreichen individuell festgelegter Ziele gezahlt wird. In den Festbezügen enthalten sind Nebenleistungen in Form eines Dienstwagens mit privater Nutzungsmöglichkeit und Zuschüsse zur Krankenversicherung sowie zur freiwilligen Rentenversicherung. Die Höhe der Festbezüge wird in erster Linie von der übertragenen Funktion bzw. Verantwortung bestimmt. Den Mitgliedern des Vorstands sind zusätzlich Versorgungszusagen in Form von Direktversicherungen gemacht worden. Die variable Vergütung enthält kurzfristige und auch langfristige Komponenten, nähere Hinweise hierzu sind im Vergütungsbericht zu finden. Neben diesen festen und variablen Vergütungskomponenten erhalten die Mitglieder des Vorstands in unregelmäßigen Abständen eine dritte, am langfristigen Unternehmenserfolg orientierte aktienbasierte Vergütung bestehend aus Aktienoptionen gemäß dem jeweils gültigen Aktienoptionsprogramm.

Die Vergütung des Aufsichtsrats ist in § 19 der Satzung der SÜSS MicroTec AG geregelt. Gemäß § 19 der Satzung erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats folgende Vergütung: Neben der Erstattung ihrer Auslagen und einem Sitzungsgeld von 1.500 € pro Sitzung erhält jedes Aufsichtsratsmitglied eine feste Vergütung, die sich an der Verantwortung und dem Tätigkeitsumfang der Aufsichtsratsmitglieder orientiert. Demnach erhält der Vorsitzende des Aufsichtsrats 45.000 €, sein Stellvertreter 40.000 € und ein einfaches Mitglied des Aufsichtsrats 35.000 € pro Geschäftsjahr als feste Vergütung.

### **Unternehmenssteuerung, Ziele und Strategie**

Die Unternehmenssteuerung orientiert sich insbesondere an Auftragseingang, Umsatz und Auftragsbestand der einzelnen Segmente. Die Leistungsfähigkeit der Segmente wird dabei vor allem durch Beobachtung der Entwicklung der Rohertragsmarge (Umsatz abzüglich der Herstellungskosten) sowie des Segmentergebnisses gemessen. Die Darstellung des Segmentergebnisses enthält auch Erträge und Aufwendungen aus der Fremdwährungsumrechnung und aus Anlagenabgängen. In der Summe entsprechen die Ergebnisse der Segmente dem operativen Ergebnis (EBIT) des Konzerns.

Weitere Steuerungskennzahl ist die Nettoliquidität (Flüssige Mittel zuzüglich verzinslicher Wertpapiere und abzüglich Finanzschulden), die eine wesentliche Steuerungsgröße für die Finanzierungsfunktion der Holding darstellt.

SÜSS MicroTec verfolgt die Besetzung lukrativer Spezialmärkte in der Industrie der Halbleiterausrüster als Strategie. Ziel ist es durch eine klare Positionierung stets innerhalb der Top 3-Anbieter in den relevanten Märkten zu agieren. Partnerschaften mit führenden Instituten und Unternehmen der Industrie sollen sicherstellen, dass wesentliche Trends oder zukunftssträchtige Technologien stets rechtzeitig erkannt und auf deren Potenziale für SÜSS MicroTec überprüft werden. Im Vordergrund steht dabei organisches Wachstum; im Falle interessanter Technologien oder sinnvoller Komplementärprodukte wird auch externes Wachstum in Betracht gezogen.

### **Forschung und Entwicklung**

Schneller, schlanker, leistungsfähiger – maßgeschneiderte Lösungen für Kunden sind die Basis unseres langjährigen Geschäftserfolgs. Um in der von Fortschritt und Innovation geprägten Halbleiterbranche und deren anverwandten Märkten weiterhin erfolgreich sein und wachsen zu können, haben wir im abgelaufenen Geschäftsjahr unsere Anstrengungen im Bereich Forschung und Entwicklung ausgeweitet. Aus diesem Grund lag der Aufwand für Forschung und Entwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 12,9 Mio. €, nach 6,8 Mio. € im Vorjahr. Alle Produktlinien haben von unseren gesteigerten Entwicklungsaktivitäten und einer regen Zusammenarbeit mit führenden Forschungseinrichtungen und Universitäten profitiert.

Wir haben im abgelaufenen Geschäftsjahr konsequent die Einführung einer sparten-übergreifenden Entwicklungsorganisation umgesetzt und die Entwicklungsprozesse auf höchstmögliche Entwicklungsgeschwindigkeit und -effizienz ausgerichtet. Die wichtigsten Entwicklungsprojekte der einzelnen Produktlinien werden im Folgenden kurz vorgestellt.

### **Lithografie**

Acht Produktneueinführungen im Lithografiebereich erweitern das Produktportfolio der manuellen Maschinen.

Mit SELECT hat SÜSS MicroTec eine innovative Zukunftstechnologie vorgestellt, die das Anwendungsspektrum des Mask Aligners MA8BA8Gen3 erweitert. Die SELECT Plasma-behandlung ermöglicht die gezielte selektive Veränderung von mikrometerkleinen Bereichen auf Materialoberflächen. Völlig neue Möglichkeiten für die Gestaltung und Herstellung von Bauelementen werden so eröffnet, insbesondere bei MEMS-Anwendungen wie z. B. mikro-fluidischen Kanälen, Biochip-Produktion oder Solartechnik.

Bei der Nanoimprintlithografie mit SCIL (Substrate Conformal Imprint Lithography) wird mit Hilfe eines patentierten Verfahrens ein vollflächiger Abdruck eines Stempels auf dem Wafer erzeugt. Die neue 200mm SCIL Option ermöglicht die vollflächige Herstellung von Nanostrukturen kleiner als 50nm Strukturgröße auf Wafergrößen bis zu 200mm Durchmesser.

Die neue Generation des hochpräzisen Alignment-Vermessungstools DSM200Gen2 präsentiert ein modernes Gerätekonzept. Erweiterte Möglichkeiten zur Infrarot-Vermessung und die verbesserte Ergonomie und Bedienfreundlichkeit sprechen besonders Kunden im Bereich der 3D-Integration an.

Ein völlig neuer manueller Coater für 200mm Wafer, die RCD8, vereint erstmals Resist-belackung und -entwicklung in einem Gerät und schafft so deutliche Kostenvorteile für unsere institutionellen Kunden. Durch die einheitliche Technologieplattform mit zukünftigen automatischen 200mm Systemen, kann der Kunde entwickelte Prozesse zudem leicht in die spätere Serienfertigung überführen.

Der neue Altaspray12 ist der große Bruder des erfolgreichen 200 mm Spraycoaters Delta AltaSpray. So steht erstmals eine 300mm manuelle Version für das Spraycoaten zur Verfügung, das besonders für Substrate mit signifikanter Topografie, z.B. für zahlreiche MEMS Technologien und im Advanced Packaging Bereich Verwendung findet, speziell für Packaging von CMOS Bildsensoren.

Weitere Überarbeitungen der SÜSS MicroTec Lithografieproduktpalette, zwei 200mm Hotplates und ein passendes Primer Modul, unterstützen unsere Kunden zukünftig bei der Prozess-optimierung und Ausbeutensteigerung.

Nach den erfolgreichen Markteinführungen im manuellen Lithografie-Bereich, konzentrieren sich die laufenden Entwicklungsaktivitäten und die wichtigsten Zukunftsprojekte nun auf die automatischen Produktionssysteme.

#### Substrat Bonder

Zwei wichtige Produkteinführungen im abgelaufenen Geschäftsjahr schaffen die Grundlage für das zukünftige Wachstum der Bonder Division.

Mit dem neuen Temporary Bonder XBS300 und dem neuen Produktionsdebonder XBC300 Gen2 hat SÜSS MicroTec auch eine neue universelle Geräteplattform in den Markt eingeführt. Erstmals setzen alle 300mm Bonder und Coater auf einheitliche Technologien. Gleichartige Robotik, Handling, Kontroll- und Steuerungshardware, Verkabelung sowie eine vereinheitlichte Software schaffen die Basis für die schnelle Marktreife zukünftiger Produktgenerationen bei gleichzeitig hoher Qualität und Produktionstauglichkeit. Dies ist ein wichtiger Meilenstein der neuen unternehmensübergreifenden Entwicklungsorganisation.

Technologisch setzt SÜSS MicroTec bei den Temporären Bond und Debond Systemen für die 3D Massenfertigung ganz auf die zukunftsweisenden Raumtemperatur-Debondprozesse. Durch frühzeitige Entwicklungszusammenarbeit mit Leitkunden und Materialanbietern bietet SÜSS MicroTec dem Kunden zugeschnittene Lösungen, insbesondere die Freiheit zwischen verschiedenen Prozessen und Materialien zu wählen. Dazu gehören derzeit Prozesse der Firmen Thin Materials (TMAT) und Brewer Science, hier handelt es sich um den sogenannten ZoneBOND™ Prozess. Die ersten Tools wurden bestellt und erfolgreich ausgeliefert. Sie werden nun unter industriellen Bedingungen in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden für die Massenfertigung optimiert.

#### Fotomasken Equipment

Die Innovationen in der Front-End-Maskenreinigung sind getrieben sowohl von den Anforderungen der ITRS Roadmap der Halbleiterindustrie als auch von den spezifischen Anforderungen der großen Hersteller von elektronischen Schaltkreisen und Speicherbauelementen.

Immer kleinere Strukturen und eine immer höhere Integrationsdichte verlangen stets nach neuen Lithografie Technologien und, in Folge, der Anpassung der damit unmittelbar verknüpften Verfahrenstechniken wie z.B. der Fotomaskenreinigung, eine der Kernkompetenzen von SÜSS MicroTec.

Die Erweiterbarkeit und Flexibilität dieser Prozess- und Anlagentechnologien ist daher ein wesentliches Kriterium. Unter anderem müssen sie mehrere Technologieknoten der optischen Lithografie für 193i abdecken sowie auch auf Extreme UV Lithografie (EUVL) anwendbar sein.

Im Zusammenhang mit EUVL spielt neben der Reinigung als solches auch die Handhabung der EUV Fotomaske eine ganz kritische Rolle, da diese nicht wie konventionelle Fotomasken durch ein sogenanntes Pellicle, eine Art Schutzfolie, vor Verunreinigung und Beschädigung geschützt ist. Stattdessen wird sie in einem sogenannten „Dualen Pod System“ transportiert. Dieses soll eine Kontamination sowohl der Vorder- als auch der Rückseite verhindern. Dieses Duale Pod System stellt besondere Anforderungen an die Automation, was zur Entwicklung von MaskTrack® Pro InSync und dessen Einführung in 2011 führte. Diese Automationsanlage stellt die Schnittstelle zwischen dem etablierten MaskTrack® Pro Fotomaskenreiniger und der übrigen EUVL Infrastruktur, insbesondere der Belichtungsanlage, innerhalb der Wafer Fabs dar.

Mit der zusätzlichen Integration eines Rückseiteninspektionsgerätes in MaskTrack® Pro InSync zum Ende des Jahres 2011, wurde MaskTrack® Pro InSync um eine wesentliche Funktion erweitert. Diese adressiert das Problem der Rückseitenkontamination von EUV Masken, indem über eine Defektmessung der Fotomaskenrückseite der vorangegangene Reinigungsprozess verifiziert wird.

Mit diesen und auch anderen weiteren Entwicklungen stellt SÜSS MicroTec die entsprechenden Weichen, um auch weiterhin seine Marktvorherrschaft zu behaupten und auszubauen sowie Komplettlösungen für die EUVL und 193i Technologie anzubieten.

Um Ihnen ein umfassendes Bild über die finanziellen Auswirkungen unserer Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zu geben, haben wir in der folgenden Tabelle die relevanten Positionen aufgelistet. Auch in diesem Berichtsjahr übertrafen die Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungsprojekte den Aktivierungsbetrag. Dies hat zu einer Nettobelastung der Gewinn- und Verlustrechnung von 2,4 Mio. € geführt (Belastung im Vorjahr 2,2 Mio. €).

**F&E Ausgaben im Jahresvergleich in Mio. €**

	2011	2010
F&E Aufwand	12,9	6,8
F&E Abschreibung	2,5	2,4
F&E Aktivierung	0,1	0,2
F&E Netto-Aktivierung	-2,4	-2,2
F&E Nettoinvestitionen + Aufwand	10,5	4,6

**F&E Mitarbeiter**

	2011	2010
F&E Mitarbeiter	111	106

**Überblick über den Geschäftsverlauf**Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Das im Rahmen des ifo World Economic Survey erhobene Weltwirtschaftsklima hat sich nach einem guten Start ins Geschäftsjahr 2011 in der zweiten Jahreshälfte merklich verschlechtert. So lag der Indikator im vierten Quartal 2011 deutlich unter seinem langfristigen Durchschnitt. Weltweit wurde „fehlendes Vertrauen in die Wirtschaftspolitik des eigenen Landes“ als wichtigster Grund für die aktuelle Verunsicherung genannt. Laut ifo Institut besteht darüber hinaus nach wie vor die Gefahr, dass die Schuldenkrise in eine europaweite Banken- und Wirtschaftskrise ausartet, die auch andere Regionen der Welt stark belasten wird.

Die Weltwirtschaft ist in 2011 insgesamt um etwa 2,6 % gewachsen. Am stärksten war das Wachstum erneut in China mit 9,0 % gegenüber Vorjahr. Aber auch Indien und das restliche Asien (ohne China) haben in 2011 mit Wachstumsraten von 8,0 % und 4,8 % weiter zugelegt. Das Bruttoinlandsprodukt der USA ist mit 1,6 % gewachsen und lag damit auf dem gleichen Niveau der EU-27 Länder. Auch das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland ist gewachsen und lag in 2011 um etwa 3,0 % über dem Vorjahr (rwi Essen, Dezember 2011).

### Branchenspezifische Rahmenbedingungen

Dem Marktforschungsinstitut Gartner zufolge verzeichnete die weltweite Halbleiterbranche in 2011 einen Umsatzzanstieg von knapp 1 % auf rund 302 Mrd. US-Dollar (2010: 300 Mrd. US-Dollar). Nach einem starken Jahresauftakt haben die makroökonomischen Rahmenbedingungen zu einer deutlichen Verlangsamung des Geschäfts im zweiten Halbjahr 2011 geführt. Der Halbleiter-Equipment Markt ist laut Gartner jedoch insgesamt um 13,7 % gewachsen. Im Bereich Halbleiter-Verpackung und Montage gab es einen Rückgang um rund 6 % gegenüber Vorjahr.

Nach Angaben des Fachverbands Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. verzeichnete der deutsche Halbleitermarkt in 2011 einen Umsatzzanstieg von rund 8 % auf ein Gesamtvolumen von mehr als 11 Mrd. € (Vorjahr 10,3 Mrd. €). Als Grund hierfür wird das Wachstum in der Automobilbranche, im Sektor Industrieelektronik sowie der Kommunikationselektronik genannt. Der übrige europäische Markt hat in 2011 stagniert und hat sich somit deutlich schlechter als der deutsche Markt entwickelt. Die Region Asien/Pazifik hält weiterhin ihren Platz als umsatzstärkste Region mit einem Marktanteil von über 50 %, wovon China nach wie vor die Hälfte beisteuert.

### Unternehmensentwicklung

Die SÜSS MicroTec-Gruppe hat ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2011 absolviert, sie erwirtschaftete Umsatzerlöse in Höhe von 175,4 Mio. € und übertraf damit deutlich den Vorjahreswert von 139,1 Mio. € um 26 %. Der Auftragseingang ist im Jahresvergleich um 24 % auf 143,1 Mio. € gesunken (Vorjahr: 189,3 Mio. €).

Dank des Umsatzzanstiegs konnte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2011 ein deutlich verbessertes Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in Höhe von 18,6 Mio. € erwirtschaften. Im Vorjahr betrug das EBIT 14,3 Mio. €. Um dieses Ziel zu erreichen hat das Unternehmen die in den Vorjahren eingeleiteten operativen und strukturellen Maßnahmen konsequent weitergeführt. Im Rahmen der positiven Geschäftsentwicklung konnte auch die Liquiditätssituation der SÜSS MicroTec-Gruppe weiter verbessert werden. Die liquiden Mittel und verzinslichen Wertpapiere beliefen sich zum Ende des Geschäftsjahres 2011 auf 56,4 Mio. €. Die Nettoliquidität erhöhte sich zum Jahresende 2011 auf 42,0 Mio. € (31. Dezember 2010: 34,6 Mio. €). Der Free Cashflow für das Gesamtjahr belief sich vor Berücksichtigung von Wertpapiererwerben und -verkäufen sowie Sondereffekten aus den getätigten M&A-Aktivitäten auf 3,5 Mio. € (Vorjahr: 14,1 Mio. €).

Der Auftragsbestand betrug zum Stichtag 83,7 Mio. € und lag aufgrund des rückläufigen Auftragseingangs unter dem Vorjahresniveau von 116,1 Mio. €.

Das Verhältnis von neu eingegangenen Aufträgen zu realisierten Umsätzen (Book-to-Bill-Ratio) belief sich in 2011 auf 0,82 nach 1,36 im Vorjahr.

#### Umsätze und Auftragslage in den Regionen

Europa, Nordamerika und Asien sind die für das Geschäft von SÜSS MicroTec wichtigen Weltregionen. Dabei unterteilen wir Asien jedoch in Japan und „Sonstiges Asien“, um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass unsere Kunden im Markt Advanced Packaging vornehmlich außerhalb Japans – insbesondere in Taiwan – ansässig sind. Dieser Markt ist allerdings auch schwankungsanfälliger als jener für Verbindungshalbleiter und MEMS.

#### *Auftragseingänge nach Regionen*

Im Vergleich zum sehr starken Geschäftsjahr 2010 haben alle Regionen rückläufige Auftragseingänge hinnehmen müssen. In **Europa** verringerte sich der Auftragseingang um rund 32 % auf 34,2 Mio. € nach 50,0 Mio. € im Vorjahr. Auch die Region **Nordamerika** verzeichnete einen Rückgang um 34 % im Auftragseingang und erreichte im Gesamtjahr 2011 Aufträge in Höhe 22,4 Mio. € (Vorjahr: 33,9 Mio. €). Die Region **Japan** verzeichnete im Jahr 2011 einen Auftragseingang von 10,9 Mio. €, was ein Minus von 25 % gegenüber Vorjahr bedeutet. Die SÜSS MicroTec-Gruppe hat in der Region **Asien** (ohne Japan) den geringsten Auftragsrückgang in Höhe von 17 % auf 75,6 Mio. € (Vorjahr: 90,9 Mio. €) verzeichnet.

Die schwächere Entwicklung der Auftragseingänge ist erneut der gesamtwirtschaftlichen Lage geschuldet. Hat in 2010 die positive Stimmung an den Weltmärkten zu allgemein deutlich steigenden Auftragseingängen geführt, so hat die Verunsicherung der Unternehmen und Konsumenten durch die Schuldenkrise in Europa in 2011 zu einem eher zurückhaltenden Orderverhalten geführt. Unsere speziell auf Kundenbedürfnisse und wachstumsstarke Märkte ausgerichteten Produkte haben sich jedoch auch in diesen schwierigen Zeiten bewährt.



### Auftragseingänge nach Regionen in Mio. €

	2011	2010
Europa	34,2	50,0
Nordamerika	22,4	33,9
Japan	10,9	14,5
Sonstiges Asien	75,6	90,9
Rest der Welt	0	0

### *Umsätze nach Regionen*

Ein sehr positives Bild zeichnet sich bei der Entwicklung des Umsatzes nach Regionen. Alle Regionen konnten im Vergleich zum Vorjahr deutlich zulegen. In **Europa** erhöhte sich der Umsatz um rund 10 % auf 40,2 Mio. € nach 36,7 Mio. € im Vorjahr. Die Region **Nordamerika** verzeichnete im Vergleich zum Vorjahr einen starken Anstieg von 55 % auf 29,5 Mio. € (Vorjahr: 19,0 Mio. €). Auch **Japan** erreichte mit 13,0 Mio. € einen deutlich höheren Wert als im Vorjahr (6,9 Mio. €). Eine deutliche Umsatzsteigerung konnte auch in der Region **Asien** erzielt werden, hier lag der Umsatz in 2011 bei 92,8 Mio. € und damit 21 % über dem Vorjahreswert von 76,5 Mio. €.

### Umsätze nach Regionen in Mio. €

	2011	2010
Europa	40,2	36,7
Nordamerika	29,5	19,0
Japan	13,0	6,9
Sonstiges Asien	92,8	76,5
Rest der Welt	0	0

### Geschäftsentwicklung in den einzelnen Segmenten

#### *Lithografie*

Das Segment Lithografie umfasst die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb der Produktlinien Mask Aligner, Developer und Coater. Die Entwicklung und Produktion dieser Produktlinien ist in Deutschland an den Standorten Garching bei München und Sternenfels angesiedelt. Das Segment Lithografie ist mit einem Umsatzanteil von 64% der größte Bereich der SÜSS MicroTec-Gruppe. Die Komponenten, die auf diesen Maschinen gefertigt werden, gehen im Wesentlichen in die Endmärkte Mikrosystemtechnik, Verbindungshalbleiter (LED) sowie 3D Integration und das Advanced Packaging.

Im Geschäftsjahr 2011 erzielte das Segment Lithografie einen Auftragseingang von 98,5 Mio. € sowie einen Umsatz von 111,5 Mio. €, dies entspricht einem Rückgang im Auftragseingang um 17 % bzw. einem Plus im Umsatz von 25 % gegenüber Vorjahr. Treiber der Nachfrage waren weiterhin asiatische Produktionskunden, aber auch Nordamerika konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr seinen Umsatzanteil deutlich steigern. Das Segmentergebnis (EBIT) verbesserte sich von 17,0 Mio. € im Vorjahr auf 25,5 Mio. € im abgelaufenen Geschäftsjahr, dies entspricht einem Zuwachs von 51 %. Die Bruttomarge hat sich erneut gegenüber Vorjahr kaum verändert und lag in 2011 bei 43,7 % (Vorjahr 43,8 %). Der Grund für die positive Entwicklung im Umsatz liegt an der gestiegenen Nachfrage nach den beiden großen Produktlinien des Segments, sowohl Coater/Developer als auch Mask Aligner haben sich im Umsatz sehr positiv entwickelt. Allgemein hat jedoch die Verunsicherung der Endkunden und Unternehmen über den Fortgang der Schuldenkrise und die möglichen makroökonomischen Folgen zu einem vorsichtigen Bestellverhalten, insbesondere zum Jahresende, geführt.

#### **Segmentübersicht Lithografie (in Mio. €)**

	2011	2010
Auftragseingang	98,5	118,9
Segmentumsatz	111,5	88,9
Segmentergebnis	25,5	17,0
Nettovermögen	36,1	29,0

#### ***Substrat Bonder***

Das Segment Substrat Bonder umfasst die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb der Substrat (Wafer) Bonder. Seit 2011 ist die Fertigung in Sternenfels angesiedelt, der Bonder-Vertrieb sowie das nordamerikanische Service- und Applikationscenter wurden im letzten Jahr nach Kalifornien verlegt. Zu den adressierten Märkten der Substrat Bonder zählen die Mikrosystemtechnik, die Verbindungshalbleiter sowie die 3D-Integration.

Das Segment Substrat Bonder entwickelte sich sowohl im Auftragseingang mit 18,1 Mio. € (Vorjahr 23,6 Mio. €) als auch im Umsatz mit 20,5 Mio. € (Vorjahr 24,7 Mio. €) schlechter als erwartet. Grund für diese Entwicklung war im Wesentlichen eine Verlängerung der Lieferzeiten aufgrund der Verlagerungsaktivitäten im ersten Halbjahr 2011. Dennoch wird mittelfristig die Bedeutung von Bondingsystemen im Fertigungsprozess für zukünftig dreidimensionale Chipstrukturen (3D-Integration) weiter ansteigen. Das Segmentergebnis (EBIT) fiel von vormals -7,1 Mio. € auf -11,1 Mio. €. Grund für die schwächere Ergebnisentwicklung waren finale Sonderaufwendungen im Zusammenhang mit der Geschäftsbereichsverlagerung nach Deutschland in Höhe von 1,4 Mio. € und darüber hinaus die sehr niedrigen Margen für einige große Produktionssysteme, die in 2011 an strategische Kunden und Forschungs- und Entwicklungspartner ausgeliefert wurden. Darüber hinaus wurden in diesem Segment die Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen deutlich erhöht, um einen Teil der durch die Verlagerung verlorenen Marktanteile wieder zurückzugewinnen. Die Bruttomarge verschlechterte sich entsprechend von 3,6 % auf -2,6 %.

#### **Segmentübersicht Substrat Bonder (in Mio. €)**

	2011	2010
Auftragseingang	18,1	23,6
Segmentumsatz	20,5	24,7
Segmentergebnis	-11,1	-7,1
Nettovermögen	27,7	23,1

#### ***Fotomasken Equipment***

Das Segment Fotomasken Equipment umfasst die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Maschinen, die auf die Reinigung und Prozessierung von Fotomasken für die Halbleiterindustrie spezialisiert sind und ist am Standort Sternenfels bei Stuttgart angesiedelt. Zu den adressierten Märkten des Segments Fotomasken Equipment zählt die Halbleiterindustrie, hier ist SÜSS im Frontend tätig.

Das Segment Fotomasken Equipment entwickelte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr erneut positiv. Allerdings lag der Auftragseingang Ende Dezember 2011 bei 20,2 Mio. € (Vorjahr: 39,0 Mio. €). Der Rückgang im Auftragseingang lässt sich im Wesentlichen durch die allgemein schwächeren Auftragseingänge im Halbleitersegment, aber auch durch die Tatsache, dass in 2010 der Auftragseingang ungewöhnlich hoch war, erklären. Der Segmentumsatz belief sich auf 36,3 Mio. € nach 18,4 Mio. € in 2010. Das Segmentergebnis (EBIT) weist im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 5,3 Mio. € (Vorjahr: 2,1 Mio. €) aus. Die Bruttomarge lag nach 36,9 % im Vorjahr bei 34,2 %.

**Segmentübersicht Fotomasken Equipment (in Mio. €)**

	2011	2010
Auftragseingang	20,2	39,0
Segmentumsatz	36,3	18,4
Segmentergebnis	5,3	2,1
Nettovermögen	11,5	11,0

*Sonstige*

Das Segment Sonstige umfasste im abgelaufenen Geschäftsjahr neben dem Maskengeschäft für die Halbleiterindustrie auch die MikroOptik-Aktivitäten am Standort Neuchâtel, Schweiz sowie das Geschäftsfeld C4NP und die größtenteils auf Segmentebene nicht zurechenbaren Kosten der zentralen Konzernfunktionen. Das in den USA ansässige Maskengeschäft für die Halbleiterindustrie wurde im Oktober 2011 an die Compugraphics Inc. verkauft. Dieser Schritt unterstützt das Geschäft von SÜSS MicroTec mit Fotomasken Equipment, indem mögliche Konkurrenzsituationen mit Kunden ausgeschlossen werden.

Das abgelaufene Geschäftsjahr verlief für das Segment Sonstige stabil. Der Auftragseingang verringerte sich von 7,8 Mio. € in 2010 auf 6,4 Mio. € in 2011. Der Segmentumsatz belief sich auf 7,1 Mio. € nach 7,0 Mio. € im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Hierbei verzeichnete das Geschäftsfeld MikroOptik im Auftragseingang einen Rückgang von 5,1 Mio. € auf 3,8 Mio. € sowie eine Steigerung im Umsatz von 4,3 Mio. € auf 4,6 Mio. €. Im Maskengeschäft verringerte sich der Umsatzbeitrag von 2,4 Mio. € im Vorjahr auf 1,7 Mio. €. Der Auftragseingang fiel um 37 % auf 1,5 Mio. €. Das Segmentergebnis in 2010 wurde durch einen einmaligen Währungseffekt in Höhe von 1,8 Mio. € sowie den im Rahmen der Erstkonsolidierung der HamaTech APE festgestellten Badwill in Höhe von insgesamt 2,7 Mio. € positiv beeinflusst und belief sich im Gesamtjahr 2010 auf 2,3 Mio. €. Für das Geschäftsjahr 2011 belief sich das Segmentergebnis auf -1,1 Mio. €.

**Segmentübersicht Sonstige (in Mio. €)**

	2011	2010
Auftragseingang	6,4	7,8
Segmentumsatz	7,1	7,0
Segmentergebnis	-1,1	2,3
Nettovermögen	7,2	7,9

**Mitarbeiter nach Segmenten**

	2011	2010
Lithografie	340	324
Substrat Bonder	136	141
Fotomasken Equipment	106	91
Sonstige	42	60

**Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage****Ertragslage**

Die Ertragslage des SÜSS MicroTec Konzerns entwickelte sich im Geschäftsjahr 2011 sehr positiv. Die Umsätze stiegen im Vergleich zum Vorjahr um rund 26 % und beliefen sich auf 175,4 Mio. €, während im Vorjahr noch 139,1 Mio. € erzielt wurden. Das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) aus fortgeführten Aktivitäten erhöhte sich von 14,3 Mio. € in 2010 auf 18,6 Mio. € im abgelaufenen Geschäftsjahr.

Das EBIT für das Geschäftsjahr 2011 ist nur in sehr geringem Umfang von Sondereffekten beeinflusst. So entstanden im Zusammenhang mit der Schließung des Standortes Waterbury (Vermont / USA) und der Verlagerung des Substrat Bonder Bereichs nach Sternenfels in 2011 Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von 1,4 Mio. €. Bereinigt um diese Sondereffekte betrug das EBIT des aktuellen Geschäftsjahres rund 20,0 Mio. € (nach einem um Sondereffekte bereinigten EBIT von 14,0 Mio. € im Vorjahr).

Der Anstieg der Umsatzerlöse aus den fortgeführten Aktivitäten um 36,3 Mio. € auf 175,4 Mio. € resultiert aus einer gestiegenen Nachfrage nach unseren Produkten vor allem in den Segmenten Lithografie und Fotomasken Equipment. So kletterten die Umsätze im umsatzstärksten Bereich Lithografie um 22,6 Mio. € auf 111,5 Mio. € und im Segment Fotomasken Equipment um 17,9 Mio. € auf 36,3 Mio. €. Im Segment Substrat Bonder war hingegen ein Umsatzrückgang um 4,2 Mio. € auf 20,5 Mio. € zu verzeichnen, der vor allem dem Umzug und der Integration des Substrat-Bonder-Bereichs in die SUSS MicroTec Lithography GmbH (Sternenfels) geschuldet war. Im Segment „Sonstiges“ zeigte sich eine sehr unterschiedliche Entwicklung. Die Umsätze im Bereich MikroOptik stiegen weiter an und erhöhten sich von 4,3 Mio. € im Vorjahr auf nun 4,6 Mio. €. Die C4NP-Technologie trug mit 0,7 Mio. € (Vorjahr 0,2 Mio. €) zum Konzernumsatz bei. Im Konzernumsatz sind darüber hinaus Umsätze des Bereichs Fotomasken in Höhe von 1,7 Mio. € (Vorjahr 2,4 Mio. €) enthalten, die von der SUSS MicroTec Precision Photomask Inc. (Palo Alto, Kalifornien / USA) erzielt wurden. Der Geschäftsbetrieb der SUSS MicroTec Precision Photomask Inc. wurde im Oktober 2011 verkauft. Die Umsätze in diesem Bereich wurden somit in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2011 erzielt. Nach dem Verkauf des Geschäftsbetriebs fielen keine weiteren Umsätze mehr an.

In den Umsatzkosten sind Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten in Höhe von 2,5 Mio. € enthalten. Damit sind die Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten um rund 2,4 Mio. € höher als die Neu-Aktivierungen, die sich im Berichtsjahr auf lediglich 0,1 Mio. € summierten. In 2010 beliefen sich die Aktivierungen von Entwicklungskosten auf 0,2 Mio. €, während die Abschreibungen rund 2,4 Mio. € betrugen (fortgeführte Aktivitäten).

Im Berichtsjahr konnte aus den fortgeführten Aktivitäten ein Rohertrag von 66,4 Mio. € erzielt werden, was einer Rohertragsmarge von 37,9 % entspricht. Im Vorjahr betrug der Rohertrag 51,1 Mio. €; die Rohertragsmarge 2010 belief sich auf 36,7 %. Der absolute Anstieg des Rohertrags resultiert aus Umsatzzuwächsen in den Bereichen Lithografie, Fotomasken Equipment und Mikrooptik. Das Rohergebnis im Segment Substrat Bonder war hingegen leicht negativ, da bei gesunkenen Umsätzen immer noch hohe Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten anfielen. Zudem wurde im Zusammenhang mit dem Umzug des Bonder-Bereichs von Waterbury nach Sternenfels der Lagerbestand bereinigt, woraus erhöhte Aufwendungen für Lagerabwertungen und Verschrottungen resultierten.

Infolge der konsequenten Fortführung des implementierten Sparkurses sind die Vertriebskosten erneut nur unterproportional angestiegen. Die Vertriebskosten erhöhten sich von 17,4 Mio. € im Vorjahr auf 19,0 Mio. €, was – in Relation zum erzielten Umsatz – einer Aufwandsquote von 10,8 % (2010: 12,5 %) entspricht. Während vor allem bei der SUSS MicroTec Inc. (USA) und bei der SUSS MicroTec K.K. (Japan) aufgrund der Neuordnung der Geschäftsbetriebe Einsparungen zu verzeichnen waren, erhöhten sich bei den produzierenden Gesellschaften in Deutschland vor allem die Aufwendungen für Vertriebsprovisionen und trugen somit dem gestiegenen Umsatzniveau Rechnung. Die Verwaltungskosten reduzierten sich von 17,8 Mio. € auf 15,7 Mio. € und entsprechen damit in 2011 einer Aufwandsquote von 9,0 % (2010: 12,8 %). Im Vorjahr waren in den Verwaltungskosten Sonderaufwendungen für die Verlagerung des Bereichs Substrat Bonder von Waterbury (Vermont / USA) nach Sternenfels in Höhe von 1,2 Mio. € sowie die Kosten für die Verlagerung des Werks Vaihingen nach Sternenfels in Höhe von 0,3 Mio. € enthalten. Darüber hinaus konnten in nahezu allen Gesellschaften des Konzerns die Verwaltungskosten durch Einsparungsmaßnahmen weiter reduziert werden. Die Verlagerung wesentlicher Teile des Substrat-Bonder-Bereichs nach Sternenfels führte zu deutlich gesunkenen Verwaltungskosten bei der SUSS MicroTec Inc.; zusätzlich sind auch die Verwaltungskosten der SUSS MicroTec Lithography GmbH – trotz Integration des Substrat-Bonder-Bereichs – weiter zurückgegangen.

Die Forschungs- und Entwicklungskosten erhöhten sich von 6,8 Mio. € auf 12,9 Mio. € und betrafen mit 6,2 Mio. € den Bereich Lithografie und mit 3,8 Mio. € den Bereich Substrat Bonder. 2,4 Mio. € waren dem Segment Fotomasken Equipment zuzuordnen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge betrugen im Berichtsjahr 4,8 Mio. € (nach 10,0 Mio. € im Vorjahr) und beinhalteten vor allem Erträge aus Fremdwährungsumrechnungen. In den sonstigen betrieblichen Erträgen des Vorjahres war die erfolgswirksame Vereinnahmung des Badwills in Höhe von 2,7 Mio. € enthalten, der aus der Erstkonsolidierung der HamaTech APE GmbH & Co. KG und der nachträglichen Kaufpreisanpassung resultierte. Außerdem war im Vorjahr der positive Fremdwährungseffekt aus der Rückführung des US-Dollar-Darlehens der Suss MicroTec Inc., Waterbury, in Höhe von 1,8 Mio. € erfasst.

Der Bereich Lithografie steuerte ein Segmentergebnis in Höhe von 25,5 Mio. € (2010: 17,0 Mio. €) zum Konzern-EBIT aus fortgeführten Aktivitäten (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) bei. Damit ergibt sich für den Bereich Lithografie eine Umsatzrendite von 22,9 %, die sich im Vergleich zum Vorjahr (2010: 19,1 %) deutlich verbessert hat.

Im Bereich Substrat Bonder ergibt sich ein EBIT von minus 11,1 Mio. € nach minus 7,1 Mio. € im Vorjahr. Das Ergebnis war erneut belastet durch hohe Entwicklungskosten im Bereich Thin Wafer Handling. Zudem musste SUSS MicroTec – bedingt durch den Umzug des Bonder-Bereichs von Waterbury (Vermont / USA) nach Sternenfels – einige Anlaufschwierigkeiten in Kauf nehmen: So wurde die Produktion in Sternenfels mit ca. 50 Mitarbeitern neu aufgebaut. Auch in der Zusammenarbeit zwischen der SUSS MicroTec Lithography GmbH in Sternenfels mit den größtenteils in den USA ansässigen Zulieferern galt es, einige Startschwierigkeiten zu überwinden, was zu erhöhten Lieferzeiten und einzelnen Verlusten von Aufträgen führte. Außerdem ist das Ergebnis im Geschäftsjahr belastet durch Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von 1,4 Mio. €, die im Zusammenhang mit der Verlagerung des Substrat-Bonder-Bereichs nach Deutschland anfielen. Im Vorjahr wurden einige margenschwache Aufträge für die strategisch wichtigen Kooperationspartner IMEC und ITRI abgewickelt. Die Restrukturierungsaufwendungen betrugen im Vorjahr 3,9 Mio. €.

Das in 2010 neu erworbene Segment Fotomasken Equipment trug mit einem Ergebnis von 5,3 Mio. € zum Konzern-EBIT bei. Die Umsatzrendite lag bei 14,6 % und hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr (Umsatzrendite 2010: 11,4 %) verbessert. Im Vorjahr erzielte das Segment Fotomasken Equipment in den zehn Monaten seit der Erstkonsolidierung ein EBIT von 2,1 Mio. €.

Das Finanzergebnis belief sich in 2011 auf 1,0 Mio. € (nach minus 0,3 Mio. € im Vorjahr) und resultierte im Wesentlichen aus gestiegenen Zinserträgen, während die Zinsaufwendungen sich im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert haben. Zudem ist im Finanzergebnis 2011 der Veräußerungsgewinn aus dem Verkauf von 747.530 Cascade-Aktien erfasst, der sich auf 0,8 Mio. € belief.

Das Konzernergebnis ist mit Ertragsteuern in Höhe von 5,8 Mio. € belastet, was einer durchschnittlichen Steuerquote von rund 30 % entspricht. Im Vorjahr fiel die steuerliche Belastung des Konzernergebnisses mit 1,0 Mio. € deutlich geringer aus. Der am Vorsteuerergebnis gemessen unverhältnismäßig geringe Ertragsteueraufwand resultierte im Vorjahr im Wesentlichen aus positiven Effekten aus der Aktivierung von latenten Steueransprüchen, die sich im Zusammenhang mit der Verlagerung des Substrat-Bonder-Bereichs von den USA nach Deutschland ergaben. Die tatsächlich anfallenden laufenden Steueraufwendungen betrugen in 2010 rund 4,8 Mio. €, während aus den latenten Steuern ein Steuerertrag in Höhe von rund 3,8 Mio. € resultierte.



Im Konzern ergab sich ein Gewinn nach Steuern aus fortgeführten Aktivitäten von 13,8 Mio. €. Dem steht im Vorjahr ein Gewinn von 13,0 Mio. € gegenüber.

Aus nicht fortgeführten Aktivitäten erzielte der Konzern im Berichtsjahr ein Ergebnis nach Steuern von minus 21 T€ (Vorjahr: 0,3 Mio. €), das ausschließlich dem nicht fortgeführten Bereich Test Systeme zuzuschreiben ist. Im Vorjahr wurde hier zum einen das operative Ergebnis von minus 1,3 Mio. € ausgewiesen, das aus der laufenden Geschäftstätigkeit sowie aus nachlaufenden Kosten für die Abwicklung des Bereichs Test von Jahresbeginn bis zum Entkonsolidierungszeitpunkt am 27. Januar 2010 resultierte. Zum anderen wurde hier im Vorjahr der Gewinn aus Entkonsolidierung abgebildet, der sich auf 1,6 Mio. € belief.

Insgesamt erzielte der Konzern im Berichtsjahr ein Ergebnis nach Steuern von 13,8 Mio. € (Vorjahr: 13,4 Mio. €).

Das unverwässerte Ergebnis je Aktie aus fortgeführten und nicht fortgeführten Aktivitäten betrug 0,72 € nach 0,73 € im Vorjahr.

Der Umsatz je Mitarbeiter erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 24,5 % von 226 T€ auf 281 T€ (basierend auf der jeweiligen Anzahl der Mitarbeiter zum Bilanzstichtag).

### **Finanz- und Vermögenslage**

Dem Konzern ist es gelungen, seine Net Cash Position – der Saldo aus flüssigen Mitteln sowie verzinslichen Wertpapieren und Finanzverbindlichkeiten – von 34,6 Mio. € im Vorjahr auf 42,0 Mio. € weiter auszubauen. Der Bestand an liquiden Mitteln und verzinslichen Wertpapieren erhöhte sich von 50,1 Mio. € im Vorjahr auf 56,4 Mio. € zum Ende des Berichtsjahres.

Der Cash Flow aus dem operativen Geschäft belief sich auf 6,1 Mio. € (2010: 16,1 Mio. €). Hier machte sich vor allem der weitere Anstieg des Konzernlagerbestands bemerkbar, aus dem ein Mittelabfluss in Höhe von 7,7 Mio. € resultierte. Neben einem Zuwachs der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe um 1,5 Mio. € erhöhte sich auch der Bestand an Demonstrationsgeräten (insbesondere im Bonder-Bereich) um 1,7 Mio. €. Zudem stieg der Bestand an Maschinen, die bereits an Kunden ausgeliefert wurden, bei denen die Endabnahme jedoch noch aussteht, auf 17,4 Mio. € (nach 15,8 Mio. € im Vorjahr). Auch der Anstieg der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie der Rückgang der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sorgten für Mittelabflüsse von insgesamt 3,8 Mio. €. Zur Reduzierung des Cash Flows trug außerdem der Rückgang der erhaltenen Kundenanzahlungen bei, die sich von 23,6 Mio. € um 5,2 Mio. € auf nun 18,4 Mio. € verringerten.

Der Cash Flow aus der Investitionstätigkeit betrug ohne Berücksichtigung der Investitionen in Wertpapiere minus 2,6 Mio. €. Investiert wurde im Wesentlichen in Sachanlagen. Im Vorjahr betrug der investive Cash Flow ohne Berücksichtigung des Erwerbs der HamaTech APE GmbH & Co. KG sowie Grundstück und Gebäude Sternenfels, der Veräußerung des Test Business und der Investitionen in Wertpapiere minus 2,8 Mio. €.

Der freie Cash Flow belief sich damit – vor Berücksichtigung von Wertpapiererwerben und -verkäufen – auf 3,5 Mio. €, nachdem im Vorjahr (bereinigt um den Erwerb der HamaTech inklusive Grundstück und Gebäude Sternenfels und Veräußerung des Test Business und vor Berücksichtigung von Wertpapiererwerben) ein freier Cash Flow von 14,1 Mio. € erzielt wurde.

Im Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit zeigt sich die planmäßige Tilgung des Immobilien-Darlehens Sternenfels sowie die planmäßige Tilgung des Finanzierungsleasings für das konzernweite SAP-System. Im Vorjahr spiegelte sich im Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit der Mittelzufluss aus der im Mai 2010 durchgeführten Kapitalerhöhung wider, aus der ein Nettozufluss von 6,6 Mio. € resultierte. Darüber hinaus wurde im Vorjahr ein Darlehen zur Finanzierung des neu erworbenen Betriebsgrundstücks in Sternenfels aufgenommen, das zu einem Mittelzufluss von 4,5 Mio. € führte.

Neben liquiden Mitteln und verzinslichen Wertpapieren in Höhe von 56,4 Mio. € (Vorjahr: 50,1 Mio. €) verfügt der Konzern zum Ende des Berichtsjahres über inländische Aval- und Kreditlinien von 13,5 Mio. € (Vorjahr: 9,5 Mio. €). Die Linie wurde im Berichtsjahr ausschließlich in Form von Avalen in Anspruch genommen. Der wesentliche Teil davon entfällt auf Anzahlungsbürgschaften. Zum Bilanzstichtag betrug die Inanspruchnahme 2,9 Mio. €.

Mit Vertrag vom 30./31. März 2011 haben die SÜSS MicroTec AG und die SUSS MicroTec Lithography GmbH mit dem Bankenkonsortium unter Führung der BayernLB Kreditverträge unterzeichnet, mit denen eine Kreditlinie von insgesamt 8 Mio. € gestellt wird. Die Kreditlinie hat eine Laufzeit bis zum 31. März 2012 und wurde ohne Covenants gestellt. Sie dient in erster Linie der Unterlegung von Anzahlungsbürgschaften.

Mit Vertrag vom 1./5. April 2011 haben die SÜSS MicroTec AG und die SUSS MicroTec Lithography GmbH mit der DZ BANK AG einen Rahmenkreditvertrag abgeschlossen, mit dem eine Kreditlinie in Höhe von 2 Mio. € gestellt wird. Die Kreditlinie läuft bis zum 31. März 2012 und wurde ohne Covenants gestellt. Sie dient in erster Linie der Unterlegung von Anzahlungsbürgschaften.

Zwischen der HamaTech APE GmbH & Co. KG und der BW Bank Mannheim besteht ein Rahmenkreditvertrag, mit dem eine Kreditlinie in Höhe von 1 Mio. € gestellt wird. Die Kreditlinie läuft auf unbestimmte Zeit und wurde ohne Covenants gestellt. Die SÜSS MicroTec AG hat zur Besicherung der Kreditlinie eine harte Patronatserklärung für die HamaTech APE GmbH & Co. KG abgegeben.

Bei einer Versicherungsgesellschaft besteht im Zusammenhang mit einem Kautionsversicherungsvertrag ein Bürgschaftsrahmen in Höhe von 2,5 Mio. €. Der Kautionsversicherungsvertrag läuft bis auf weiteres. Zur Sicherung dieser Linie wurde ein Festgeldkonto in Höhe von 0,3 Mio. € an die Versicherungsgesellschaft abgetreten.

Der Konzern verfügt insgesamt über genügend finanziellen Spielraum, notwendige Produktentwicklungen oder andere strategische Aktivitäten zu finanzieren.

Neben dem Geschäfts- oder Firmenwert bestimmen im Wesentlichen die aktivierten Entwicklungskosten sowie das Betriebsgrundstück in Sternenfeld die langfristigen Vermögenswerte.

Der Geschäfts- oder Firmenwert betrug wie im Vorjahr 13,6 Mio. € und ist ausschließlich dem Segment Lithografie zuzuordnen.

Die aktivierten Entwicklungskosten entwickelten sich im Berichtsjahr rückläufig: nach 7,6 Mio. € im Vorjahr betrugen sie zum Bilanzstichtag noch 5,4 Mio. €. Die planmäßigen Abschreibungen auf die aktivierten Entwicklungsprojekte übertrafen im abgelaufenen Geschäftsjahr die getätigten Investitionen um 2,4 Mio. €, was zu einer entsprechenden Belastung in der Gewinn- und Verlustrechnung führte. Die zum Bilanzstichtag aktivierten Entwicklungsleistungen entfielen in Höhe von 2,0 Mio. € (Vorjahr: 2,6 Mio. €) auf das Segment Lithografie und in Höhe von 3,4 Mio. € (Vorjahr: 4,9 Mio. €) auf das Segment Substrat Bonder.

Darüber hinaus enthalten die langfristigen Vermögenswerte Lizenzen und Patente sowie aktivierte Leasing-Gegenstände (SAP-Lizenzen) in Höhe von 2,8 Mio. € (Vorjahr: 3,8 Mio. €). Der Restbuchwert von 2,8 Mio. € entfällt in Höhe von 1,5 Mio. € (Vorjahr: 1,6 Mio. €) auf die Segmente Lithografie, Substrat Bonder und Fotomasken Equipment sowie in Höhe von 1,3 Mio. € (Vorjahr: 2,2 Mio. €) auf das Segment Sonstige.

Unter den immateriellen Vermögenswerten ist außerdem die im Rahmen der HamaTech-Akquisition erworbene Technologie ausgewiesen, die zum Stichtag einen Restbuchwert von 0,3 Mio. € aufweist.

Das Sachanlagevermögen ist von geringerer Bedeutung für die Vermögenslage des Konzerns, da die Gruppe auf kostenintensive Produktionsanlagen in der Regel nicht angewiesen ist. Die Investitionen beliefen sich im Berichtsjahr auf 2,8 Mio. € im Vergleich zu 7,4 Mio. € im Vorjahr. Als größte Investition ist der Einbau eines Reinraums in die gemieteten Geschäftsräume der SUSS MicroTec Inc. in Sunnyvale (Kalifornien / USA) zu nennen, der Anschaffungskosten von rund 1 Mio. USD verursachte. Im Vorjahr betraf die größte Anschaffung die Immobilie und das Grundstück Sternenfels, das im Zuge der HamaTech-Akquisition erworben wurde und im Vorjahr Anschaffungskosten von 4,5 Mio. € aufwies. Im Investitionsbetrag des Vorjahres ist außerdem der Zugang des Sachanlagevermögens der HamaTech APE GmbH & Co. KG enthalten, der sich im Erstkonsolidierungszeitpunkt auf 0,4 Mio. € belief. Insgesamt ist das Sachanlagevermögen im Vergleich zum Vorjahr um 0,1 Mio. € gestiegen.

Die latenten Steueransprüche reduzierten sich im Wesentlichen auf Grund gesunkener Verlustvorträge bei der SÜSS MicroTec AG und geringerer temporärer Differenzen im Bereich der immateriellen Vermögenswerte um insgesamt 3,5 Mio. € und betragen zum Bilanzstichtag 5,4 Mio. €.

Die kurzfristigen Vermögenswerte sind im Berichtsjahr um 12,9 Mio. € auf nun 150,1 Mio. € angestiegen. Dieser Anstieg resultierte im Wesentlichen aus den Vorräten, den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und dem Bestand an Wertpapieren.

Die Vorräte erhöhten sich von 64,4 Mio. € zum Vorjahresstichtag auf 71,6 Mio. €. Die Erhöhung ist teilweise auf einen höheren Bestand von Demonstrationsgeräten zurückzuführen, der im Geschäftsjahr von 11,0 Mio. € auf 12,5 Mio. € anstieg. Der Bestand an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen erhöhte sich im Geschäftsjahr um 1,2 Mio. € auf 24,4 Mio. €. Auch die Bestände an Maschinen, die bereits an Kunden ausgeliefert wurden, bei denen die Abnahme jedoch noch aussteht, haben sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht: sie beliefen sich auf 17,4 Mio. € (nach 15,8 Mio. € im Vorjahr).

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr von 15,7 Mio. € auf 17,8 Mio. €. Hier wirkten veränderte Wechselkurse bei den Fremdwährungsforderungen mit 0,6 Mio. € werterhöhend. Der übrige Anstieg ist stichtagsbedingt und ist den zahlreichen Abnahmen von Maschinen zum Jahresende geschuldet.

Der Bestand an Wertpapieren des SÜSS MicroTec-Konzerns erhöhte sich in 2011 von 16,0 Mio. € auf 19,4 Mio. €. Im Wertpapierbestand des Vorjahres waren 747.530 Aktien an Cascade Microtech Inc., Beaverton / Oregon (USA) enthalten, die zum 31. Dezember 2010 mit 2,4 Mio. € bilanziert waren. Mit Veräußerung der Aktien im Januar 2011 hat SÜSS MicroTec einen Veräußerungsgewinn von 0,8 Mio. € realisiert. In 2011 wurden – unter Verwendung des erwirtschafteten freien Cash Flows – Wertpapiere für rund 9,1 Mio. € erworben. Bei den bilanzierten Wertpapieren handelt es sich um Unternehmens- und Staatsanleihen.

Der Rückgang der sonstigen Vermögenswerte von 3,4 Mio. € im Vorjahr auf 2,8 Mio. € zum Jahresende ist im Wesentlichen auf geringere Umsatzsteuerforderungen zurückzuführen, die sich stichtagsbedingt ergeben haben.

Die langfristigen Schulden verringerten sich von 20,8 Mio. € auf 10,5 Mio. €. Größten Anteil an den langfristigen Schulden haben die Finanzverbindlichkeiten, die sich im Geschäftsjahr um 10,1 Mio. € auf 4,3 Mio. € reduziert haben. Grund für den Rückgang ist zum einen die verringerte Restlaufzeit der Verbindlichkeiten aus Schuldscheindarlehen, die sich nun auf weniger als ein Jahr beläuft. Damit werden die Verbindlichkeiten aus Schuldscheindarlehen in Höhe von 9,0 Mio. € unter den kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten ausgewiesen. Zum anderen haben sich die langfristigen Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing im Geschäftsjahr um 0,9 Mio. € reduziert.

Bei den kurzfristigen Schulden war umgekehrt ein Anstieg von 54,4 Mio. € im Vorjahr auf 56,9 Mio. € zum Bilanzstichtag zu verzeichnen. Größten Anteil an diesem Anstieg hatte der geänderte Ausweis der Verbindlichkeiten aus Schuldscheindarlehen, die nun mit einem Buchwert von 9,0 Mio. € in den kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten enthalten sind. Im Gegenzug haben sich die kurzfristigen Rückstellungen, die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Verbindlichkeiten um insgesamt 6,4 Mio. € verringert. Die kurzfristigen Rückstellungen sind um 1,3 Mio. € auf 3,3 Mio. € zurückgegangen, was im Wesentlichen auf den Verbrauch der im Vorjahr passivierten Restrukturierungsrückstellung in Höhe von 1,4 Mio. € zurückzuführen ist. Der Rückgang der sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten von 27,0 Mio. € auf 24,1 Mio. € resultiert vor allem aus dem deutlich gesunkenen Bestand an erhaltenen Anzahlungen, die sich zum Stichtag auf 18,4 Mio. € (2010: 23,6 Mio. €) beliefen. Im Gegenzug haben sich die in den sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten enthaltenen Personalrückstellungen um 0,8 Mio. € auf 3,6 Mio. € erhöht. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben sich stichtagsbedingt von 9,7 Mio. € im Vorjahr auf nun 7,6 Mio. € reduziert.

Das Eigenkapital des SÜSS MicroTec-Konzerns hat sich seit dem 31. Dezember 2010 um 14,0 Mio. € auf 120,4 Mio. € erhöht. Die Eigenkapitalquote stieg im Jahresvergleich von 58,6 % auf 64,1 %.

Durch die Ausübung von insgesamt 379.990 Aktienoptionen durch Vorstand und Mitarbeiter erhöhte sich das Stammkapital um 1,00 € pro Aktienoption und betrug zum Bilanzstichtag 19,1 Mio. €. Pro ausgeübter Aktienoption wurden 0,30 € in die Kapitalrücklage eingestellt.

### **Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage**

Die Umsatz- und Ergebnissituation von SÜSS MicroTec hat sich im Berichtsjahr erneut sehr erfreulich dargestellt. Der SÜSS MicroTec Konzern konnte ein EBIT von 18,6 Mio. € (fortgeführte Aktivitäten) und eine EBIT-Marge von 10,6 % erzielen.

Durch die erneut verbesserte Net Cash Position von 42,0 Mio. € (Vorjahr: 34,6 Mio. €) verfügt der Konzern über ausreichend finanziellen Spielraum, um Investitionen in neue Produktentwicklungen zu forcieren sowie andere strategische Aktivitäten zu finanzieren.

### **Investitionen**

Bedingt durch die Struktur des Unternehmens sind Investitionen in Sachanlagen keine wesentliche Komponente in der Unternehmensentwicklung. Die wesentliche Wertschöpfung entsteht durch Design, Montage und Justage der Komponenten sowie der entsprechenden Softwaresteuerung. Für diese Tätigkeiten sind keine besonderen Anlagen und Maschinen erforderlich.

Wir gehen davon aus, dass sich die Investitionen in Sachanlagen langfristig in einem Bereich von ca. 1 bis 2 % des Umsatzes bewegen werden. Eine Ausnahme stellt nur die in dem Segment Sonstige enthaltene Produktlinie „Mikrooptik“ dar. In dieser Produktlinie wird Kleinserienfertigung betrieben, für die entsprechende Fertigungsmaschinen notwendig sind. Investitionen in diesem Bereich führen unmittelbar zu einem deutlichen Anstieg der Sachanlage-Investitionen im Konzern.

Ein Teil der Investitionen ist dem Bereich immaterielle Vermögenswerte zuzuordnen, da für Entwicklungskosten unter Vorliegen bestimmter Voraussetzungen nach IFRS eine Aktivierungspflicht besteht.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein weiterer Roll-Out des konzernweit führenden ERP-Systems SAP durchgeführt. So wurde das SAP-System erfolgreich bei der SÜSS MicroTec Inc. (Sunnyvale, Kalifornien / USA) eingeführt und im Mai 2011 produktiv gesetzt. Die Aufwendungen für die SAP-Einführung beliefen sich insgesamt auf rund 0,1 Mio. €. Sie wurden aktiviert und werden über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren abgeschrieben.

### Die Holding – SÜSS MicroTec AG

Die Aufgabe der Holding ist die Steuerung und Führung des SÜSS MicroTec-Konzerns. Sie übernimmt unter anderem die Aufgaben der strategischen Ausrichtung, beispielsweise der Ausweitung des Produktportfolios, Akquisitionen und Finanzfragen der gesamten Gruppe. Ebenso ist die Holding für Corporate Identity, Investor Relations und Marketing verantwortlich. Darüber hinaus übernimmt die Holding die Finanzierung von strategisch bedeutsamen Entwicklungsprojekten der operativen Tochtergesellschaften.

Die SÜSS MicroTec AG ist in der Regel alleinige Anteilseignerin an den im Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Ausleihungen der Holding erfolgten nur an Tochterunternehmen. Die Ertragslage der Holding als Einzelgesellschaft ist nicht direkt von der Entwicklung unserer Märkte abhängig. Die Holding refinanziert sich im Wesentlichen durch Umlage der umlagefähigen Kosten auf die operativen Gesellschaften, durch Zinserträge aus den Ausleihungen an Tochterunternehmen sowie durch bestehende Ergebnisabführungsverträge.

#### Darstellung der finanziellen Kennzahlen der Holding (in T€)

Gesellschaft	SMT AG (HGB)			
	2011	2010	Änderung	in %
Jahresüberschuss	9.762	6.217	3.545	57%
Eigenkapital	102.146	91.843	10.303	11%
Bilanzsumme	134.577	126.414	8.163	6%
EK Quote in %	76%	73%		
Anlagevermögen	71.982	68.422	3.560	5%
...% der Bilanzsumme	53%	54%		
Umlaufvermögen + Rechnungsabgrenzungsposten	62.595	57.992	4.603	8%
...% der Bilanzsumme	47%	46%		

### *Wesentliche Veränderungen der Vermögens- und Finanzlage*

Die immateriellen Vermögensgegenstände sanken im abgelaufenen Geschäftsjahr um 0,5 Mio. € und belaufen sich zum Stichtag auf 2,2 Mio. €. Der Rückgang beruht ausschließlich auf planmäßigen Abschreibungen.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen belaufen sich zum Bilanzstichtag auf 55,7 Mio. € und sind damit um 0,4 Mio. € geringer als im Vorjahr. Der Rückgang resultiert aus einer Abwertung der Anteile an der SUSS MicroTec Ltd., Coventry (Großbritannien), die aufgrund der Konzernplanung für 2012 sowie erwarteter Umsatzenschwankungen notwendig wurde.

Der Anstieg der Ausleihungen an verbundene Unternehmen resultiert aus einem Darlehen gegenüber der Suss MicroTec KK in Höhe von 4,8 Mio. € und planmäßigen Tilgungen in Höhe von 0,5 Mio. €.

Die kurzfristigen Forderungen gegen verbundene Unternehmen stiegen insgesamt um 1,0 Mio. €. Die Forderungen erhöhten sich deutlich durch die Jahresüberschüsse der Suss MicroTec Lithography GmbH und der Suss MicroTec REMAN GmbH, die aufgrund der bestehenden Ergebnisabführungsverträge insgesamt ein positives Ergebnis von 11,3 Mio. € an die SÜSS MicroTec AG abführten. Im Gegenzug wurde eine kurzfristige Forderung gegen die Suss MicroTec KK in ein langfristiges Darlehen umgewandelt. Darüber hinaus waren planmäßige Rückzahlungen von kurzfristigen Forderungen der HamaTech APE und der Suss MicroTec Inc. zu verzeichnen. Dadurch sanken die kurzfristigen Forderungen um 10,3 Mio. €.

Die SÜSS MicroTec AG konnte im Berichtsjahr ihre Liquiditätsposition weiter ausbauen. Der Ausbau resultiert im Wesentlichen aus dem positiven Free Cashflow der über das Konzern-Cashpooling mit der AG verbundenen Tochtergesellschaften. Die Erhöhung der Liquiditätsposition wird sowohl im Anstieg der Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 0,2 Mio. € als auch im Zuwachs von Wertpapieren in Höhe von 3,4 Mio. € sichtbar. Bei den Wertpapieren handelt es sich im Wesentlichen um Unternehmens- und Staatsanleihen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sanken im Berichtsjahr in Summe um 0,2 Mio. €. Der Rückgang resultierte aus der Rückführung von Verbindlichkeiten durch die Suss MicroTec Lithography GmbH. Gegenläufig entstanden in 2011 Verbindlichkeiten gegenüber der Suss MicroTec Inc., die in ein langfristiges Darlehen umgewandelt wurden. Zum Stichtag beläuft sich die Darlehensverbindlichkeit auf umgerechnet rund 7,7 Mio. €.



Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sanken im Verlauf des Jahres 2011 um 0,2 Mio. €. Der Rückgang resultiert aus planmäßigen Tilgungen eines Darlehens zur Finanzierung des Betriebsgrundstücks in Sternenfels. Weiterhin unverändert besteht das im Dezember 2012 fällige Schuldscheindarlehen.

Das erhöhte Eigenkapital (+10,3 Mio. €) resultiert im Wesentlichen aus dem Jahresüberschuss des Geschäftsjahres (9,8 Mio. €) und der im Geschäftsjahr ausgeübten Aktienoptionen (0,5 Mio. €).

#### *Wesentliche Ereignisse mit Einfluss auf die Ertragslage der Holding*

Im handelsrechtlichen Jahresabschluss der SÜSS MicroTec AG ergab sich für das Geschäftsjahr 2011 ein Jahresüberschuss von 9,8 Mio. € (Vorjahr: 6,2 Mio. €).

Auf Grund des zum 1. Januar 2011 gültigen Gewinnabführungsvertrages mit der Süss MicroTec Lithography GmbH, Garching, wurde bei der Holding ein Ertrag aus Gewinnübernahme in Höhe von 10,2 Mio. € ergebniswirksam gebucht. Auf Grund des im Geschäftsjahr 2008 geschlossenen Gewinnabführungsvertrages mit der Süss MicroTec REMAN GmbH, Oberschleissheim, wurde bei der Holding ein Ertrag aus Gewinnübernahme in Höhe von 1,1 Mio. € (Vorjahr: 1 T€ Verlust) ergebniswirksam erfasst.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind überwiegend Fremdwährungsgewinne in Höhe von 1,9 Mio. € (Vorjahr: 4,0 Mio. €) und Mieterlöse in Höhe von 1,0 Mio. € (Vorjahr: 0,6 Mio. €) enthalten.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten – neben laufenden Aufwendungen für die Verwaltung - Fremdwährungsverluste in Höhe von 3,4 Mio. € (nach 1,5 Mio. € im Vorjahr).

Die Zinsaufwendungen stiegen im Geschäftsjahr um 0,1 Mio. €, was im Wesentlichen auf das in 2010 neu hinzugekommene Darlehen zurückzuführen ist.

In der SÜSS MicroTec AG waren im Geschäftsjahr 2011 durchschnittlich 20 (Vorjahr: 19) Mitarbeiter tätig.

Neben der Entwicklung des US-Dollars hängt die kurz- und mittelfristige Entwicklung der SÜSS MicroTec AG vor allem von der Entwicklung der Finanz- und Ertragslage wesentlicher Tochtergesellschaften ab. Die Finanz- und Ertragslage der Tochtergesellschaften ist ausschlaggebend für die Höhe des zinstragenden Nettofinanzierungssaldos der Holding und für die Ausschüttung von Ergebnissen an die Muttergesellschaft.

### **Mitarbeiter im Konzern**

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie deren Wissen stellen einen erheblichen Teil unseres Unternehmenswerts dar. Auch die Anlernzeiten, insbesondere im technischen Bereich, sind auf Grund der sehr spezifischen Produkte länger als ein Jahr. Daher sind ein motivierendes Umfeld und eine leistungsgerechte Bezahlung Grundvoraussetzungen für die Erhaltung bestehender und für die Anwerbung qualifizierter neuer Mitarbeiter.

Zum Ende des Geschäftsjahres 2011 waren 624 (Vorjahr: 616) Mitarbeiter im Konzern beschäftigt.

### **Mitarbeiter Bereiche**

	2011	2010
Verwaltung	68	74
Marketing und Vertrieb	256	234
Produktion und Technik	300	308
SÜSS-Gruppe	624	616

### **Angaben gemäß § 315 Abs. 4 HGB**

Infolge der im Jahr 2011 durchgeführten Kapitalerhöhungen aufgrund von Ausübungen von Aktienoptionen, unter Nutzung des bedingten Kapitals, hat sich das gezeichnete Kapital der SÜSS MicroTec AG zum 31.12.2011 auf 19.101.028 € erhöht. Es ist aufgeteilt in 19.101.028 auf den Namen lautende Stückaktien. Es bestehen keine unterschiedlichen Aktiengattungen.

Es bestehen keine Beschränkungen bezüglich der Stimmrechte oder der Übertragung von Aktien.

Zum Bilanzstichtag gibt es keine direkten oder indirekten Beteiligungen am Kapital der SÜSS MicroTec AG, die 10 % überschreiten.

Sonderrechte von Aktionären, die Kontrollbefugnisse verleihen, bestehen nicht. Über die bestehenden Aktienoptionspläne sind Arbeitnehmer nach Ausübung ihrer Optionen am Kapital der Gesellschaft beteiligt. Die ihnen hieraus entstehenden Kontrollrechte üben sie unmittelbar aus.

Die Regelungen zur Ernennung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern der SÜSS MicroTec AG ergeben sich aus den §§ 84 f. AktG. Die Satzung enthält diesbezüglich keine weitergehenden Regelungen. Die Zahl der Mitglieder des Vorstands bestimmt gemäß § 7 der Satzung der Aufsichtsrat. Dieser kann auch ein Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden oder Sprecher des Vorstands und ein weiteres Mitglied zum stellvertretenden Vorsitzenden ernennen.

Satzungsänderungen sind in den §§ 133, 179 AktG geregelt. Die Befugnis zu Änderungen der Satzung, die nur die Fassung betreffen, wurde gemäß § 179 Abs. 1 Satz 2 AktG an den Aufsichtsrat delegiert.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19. Juni 2008 ermächtigt worden, in der Zeit bis zum 19. Juni 2013 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmal oder mehrfach um bis zu insgesamt € 2.552.863 durch Ausgabe von bis zu 2.552.863 neuen Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen. Ausgegeben werden dürfen jeweils Namensaktien. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit der Zustimmung des Aufsichtsrats und unter Einhaltung bestimmter Bedingungen das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.

Weiterhin ist der Vorstand durch Beschluss der Hauptversammlung am 21. Juni 2011 ermächtigt worden, in der Zeit bis zum 21. Juni 2016 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmal oder mehrfach um bis zu insgesamt € 6.500.000 durch Ausgabe von bis zu 6.500.000 neuen Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen. Ausgegeben werden dürfen jeweils Namensaktien. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit der Zustimmung des Aufsichtsrats und unter Einhaltung bestimmter Bedingungen das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.

Die bestehenden Schuldscheinverträge beinhalten eine Change-of-Control-Klausel. Demzufolge haben die Darlehensgeber die Möglichkeit zur außerordentlichen Kündigung, wenn eine oder mehrere Personen, die nicht dem Kreis der bestehenden Hauptaktionäre zuzurechnen sind, eine Anzahl von Aktien an der SÜSS MicroTec AG halten oder erworben haben, auf die 50 % oder mehr der Stimmrechte entfallen.

Mit den zwei Banken des bestehenden Konsortiums bestehen unter einem gemeinsamen Sicherheitenpool jeweils bilaterale Kreditverhältnisse, die hinsichtlich ihrer Ausgestaltung bzw. Konditionen Unterschiede aufweisen. So enthält ein Kreditverhältnis ein außerordentliches Kündigungsrecht, falls eine Änderung der Gesellschaftsverhältnisse / ein Change-of-Control eintritt und zwischen den Parteien keine rechtzeitige Einigung über die Fortsetzung zu gegebenenfalls veränderten Konditionen, z. B. hinsichtlich der Verzinsung, der Besicherung oder sonstiger Absprachen, erzielt wurde.

Weitere wesentliche Vereinbarungen der SÜSS MicroTec AG, die unter der Bedingung eines Kontrollwechsels infolge eines Übernahmeangebots stehen, bestehen nicht.

Entschädigungsvereinbarungen o. ä. mit Arbeitnehmern bzw. Mitgliedern des Vorstands für den Fall eines Übernahmeangebots existieren nicht.

Zusammenfassend bestehen keine besonderen Regelungen bezüglich der mit den Anteilen verbundenen Stimmrechte und hieraus resultierenden Kontrollmöglichkeiten, weder durch Einrichtung besonderer Aktiengattungen noch durch Stimmrechts- oder Übertragungsbeschränkungen. Über die gesetzlichen Regelungen hinausgehende Vorschriften über die Bestellung oder Abberufung von Mitgliedern des Vorstands sind nicht vorhanden. Wesentliche Geschäftsbereiche oder Aktivitäten der SÜSS MicroTec AG können mit Ausnahme des Schuldscheindarlehens im Fall eines Übernahmeangebots durch vorliegende „Change-of-Control“-Klauseln nicht wegfallen.

#### **Erklärung zur Unternehmensführung gemäß § 289a HGB**

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG haben mit Datum vom 8. März 2012 eine gemeinsame Erklärung zur Unternehmensführung nach §289a HGB abgegeben und diese auf der Internetseite der Gesellschaft unter [www.suss.com/de/investor-relations/corporate-governance/erklaerung-zur-unternehmensfuehrung.html](http://www.suss.com/de/investor-relations/corporate-governance/erklaerung-zur-unternehmensfuehrung.html) allgemein zugänglich gemacht.

## **Nachtragsbericht**

### **Aktuelle Ereignisse nach dem Stichtag**

Im Rahmen der Veräußerung des Test Business zum 28. Januar 2010 wurden vom Kaufpreis insgesamt 2,5 Mio. € auf Treuhandkonten eingestellt. Die Auszahlung war abhängig von bestimmten Bedingungen, die nach der Transaktion von SÜSS MicroTec erfüllt werden mussten. Zum 31.12.2011 wiesen die Treuhandkonten einen verbleibenden Betrag in Höhe von 1,5 Mio. € aus. Am 27. Januar 2012 (24 Monate nach Abschluss des Kaufvertrags) galten die entsprechenden Bedingungen als erfüllt. Der Betrag in Höhe von 1,5 Mio. € wurde im Februar 2012 an die SÜSS MicroTec AG ausbezahlt und ertragswirksam erfasst. Der Ertrag wird in 2012 als „Gewinn aus nicht fortgeführten Aktivitäten“ ausgewiesen werden.

### **Stimmrechtsmitteilungen nach dem Stichtag**

Die Universal Investment Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main, Deutschland, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 und § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG am 21. Februar 2012 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 20. Februar 2012 die Schwelle von 3 % unterschritten hat und zu diesem Tag 2,54 % beträgt (486.093 Stimmrechte). Davon sind ihr 2,28 % (436.843 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG zuzurechnen.

## **Risikobericht**

### **Risikomanagement-System**

Zur Erkennung und Steuerung von Risiken sowie zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen ist das Risikomanagement-System seit langem Bestandteil der Unternehmensführung.

Neben kurzfristigen (operativen) Risiken befasst sich das Risikomanagement bei SÜSS MicroTec auch mit langfristigen (strategischen) Entwicklungen, die sich negativ auf die Geschäftsentwicklung auswirken können. Auf der Grundlage eines chancenorientierten, gleichzeitig aber risikobewussten Managements ist es jedoch nicht unser Ziel, alle potenziellen Risiken grundsätzlich zu vermeiden. Vielmehr streben wir stets ein Optimum aus Risiko-vermeidung, -reduzierung und kontrollierter Risikoakzeptanz an. Das Bewusstsein für Risiken sollte nicht die Fähigkeit beeinträchtigen, Chancen zu erkennen und zum Wohle des Unternehmens und seiner Aktionäre zu nutzen.

### *Organisation und Dokumentation des Risikomanagements*

Die Organisation des Risikomanagements orientiert sich an der funktionellen und hierarchischen Struktur des Konzerns. Mit der Einführung des Risikomanagement-Systems wurde ein Risikomanagement-Beauftragter ernannt, der alle drei Monate direkt an den Vorstand berichtet.

Das eingerichtete Risikofrüherkennungs-System wird im Rahmen der Jahresabschlussprüfung jährlich geprüft.

### *Risikoidentifikation*

Alle berichtspflichtigen Einheiten des Konzerns veranstalten mindestens einmal jährlich einen Workshop, der neben der Retrospektive vor allem auf zukünftige Entwicklungen eingeht. Außerdem dienen die Workshops dazu, die konzernweit einheitliche Bewertungsmethodik sicherzustellen.

Auf Basis dieser Workshops werden vierteljährlich Risikoberichte erstellt, die bekannte Risiken einer kritischen Würdigung unterziehen und neue Themen aufnehmen.

Plötzlich auftretende Risiken werden darüber hinaus unverzüglich an den Risikomanagement-Beauftragten der jeweiligen Einheit gemeldet.

Wichtiger Bestandteil zur Risikofrüherkennung ist das Qualitätsmanagement des Konzerns. An den großen Produktionsstandorten liegt eine Zertifizierung nach ISO 9001 vor, die ein zuverlässiges, prozess- und systemorientiertes Qualitätsmanagement bestätigt. Klar strukturierte und eindeutig dokumentierte Prozesse im Rahmen des Qualitätsmanagements sorgen nicht nur für Transparenz, sondern sind mittlerweile bei den meisten Produktionskunden eine Vorbedingung für die erfolgreiche Vermarktung unserer Maschinen.

### *Risikobewertung*

Die Bewertung von Risiken erfolgt zum einen durch die Angabe der maximalen Schadenshöhe, wenn keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Auf dieser Grundlage wird der Risikowert durch Einbeziehung einer Eintrittswahrscheinlichkeit ermittelt, die entsprechende Gegenmaßnahmen berücksichtigt und, wie auch die Ermittlung der maximalen Schadenshöhe, auf den Kenntnissen und Erfahrungen der Risikobeauftragten beruht und somit stets dem aktuellsten Stand entspricht. Die Angabe des Risikowerts bezieht sich jeweils auf den Zeitraum der kommenden 12 bzw. 24 Monate.

Die identifizierten Risiken werden mit Hilfe einer Risikomatrix in drei verschiedene Risikoklassen eingeordnet, die sowohl die mögliche Schadenshöhe als auch die Eintrittswahrscheinlichkeit berücksichtigen. Risiken ab einer Schadenshöhe von 10 Mio. € werden als „bestandsgefährdend“ angesehen.

### *Risikohandhabung*

Je nach Art des Risikos und der Höhe der Bewertung werden abgestuft Maßnahmen der Risikovermeidung bzw. -minderung getroffen. Dabei orientiert sich das Risikomanagement stets an der einleitend erwähnten Maxime eines chancenorientierten Umgangs mit Risiken.

Die Risikoabwendung und Organisation von Gegenmaßnahmen wird subsidiär durchgeführt. Die Risikoverantwortlichen beziehungsweise die Berichtseinheiten sind zur Entwicklung und Umsetzung von Abwehrstrategien gegen erkannte Risiken verpflichtet. Sollten ihre Kompetenzen nicht zur Umsetzung ausreichen, fordern sie Hilfe von höheren Ebenen an.

Aus der weltweiten Tätigkeit in der Hochtechnologie ergeben sich allgemeine und aktuelle Risiken für das Unternehmen. Der Vorstand hat zur Überwachung von Risiken in geeigneter Weise Maßnahmen getroffen, um Entwicklungen, die den Fortbestand der SÜSS MicroTec-Gruppe gefährden, rechtzeitig zu erkennen.

### **Beschreibung der wesentlichen Merkmale des internen Kontroll- und Risikomanagements im Hinblick auf den Konzernrechnungslegungsprozess gemäß § 315 Abs. 2 Nr. 5 HGB**

Das Risikomanagementsystem im Hinblick auf den Konzernrechnungslegungsprozess zielt darauf ab, das Risiko der Falschaussage in der Konzernrechnungslegung sowie in der externen Berichterstattung zu minimieren. Es dient im ersten Schritt der Identifikation und Bewertung, weiterhin der Begrenzung und Überprüfung erkannter Risiken im Konzernrechnungslegungsprozess, die dem Ziel der Regelungskonformität des Konzernabschlusses entgegenstehen könnten. Das interne Kontrollsystem des Rechnungslegungsprozesses soll gewährleisten, dass trotz identifizierter Risiken in der Finanzberichterstattung ein mit hinreichender Sicherheit regelungskonformer Konzernabschluss erstellt wird.

Die Wirksamkeit des internen Kontroll- und Risikofrüherkennungssystems wird im Rahmen der Abschlussprüfung zum Jahresende durch den Abschlussprüfer überprüft. Dabei werden ausgewählte interne Kontrollen untersucht und deren Effektivität beurteilt. Darüber hinaus werden ausgewählte Aspekte der eingesetzten IT-Systeme geprüft. Eine absolute Sicherheit kann jedoch auch mit angemessenen und funktionsfähigen Systemen nicht gewährleistet werden.

Die SÜSS MicroTec AG nutzt ihr konzernweit gültiges Bilanzierungshandbuch zur einheitlichen Regelung von Bilanzierungsgrundsätzen. Durch eindeutige Vorgaben soll der Ermessensspielraum der Mitarbeiter bei Ansatz und Bewertung von Vermögenswerten und Schulden eingeschränkt und somit das Risiko konzernuneinheitlicher Rechnungslegungspraktiken verringert werden. Den Tochtergesellschaften sind bestimmte Berichtspflichten und -umfänge zwingend vorgegeben. Die Einhaltung der Berichtspflichten und -fristen wird durch die zentralen Abteilungen Finanzen und Controlling überwacht.

Die Buchhaltung der Tochtergesellschaften wird entweder lokal mit eigenen Mitarbeitern oder mit der Unterstützung von externen Buchführungsfirmen oder Steuerberatungsgesellschaften durchgeführt. Dabei werden unterschiedliche EDV-Systeme eingesetzt. Alle deutschen Gesellschaften arbeiten bereits seit 2008 mit SAP. Seit 2010 wird SAP auch bei der Süss MicroTec (Taiwan) Company Ltd., Hsin Chu (Taiwan), verwendet. Im Geschäftsjahr wurde SAP schließlich bei der Süss MicroTec Inc., Sunnyvale (Kalifornien / USA) implementiert. Das Reporting an die Konzernzentrale erfolgt mit Hilfe der Managementinformationssysteme „MIS Package“. Die Einzelabschlüsse werden schließlich in ein zentrales Konsolidierungssystem eingelesen. Auf Konzernebene wird innerhalb der Finanzabteilung und des Controllings die Ordnungsmäßigkeit und Verlässlichkeit der von den Tochtergesellschaften vorgelegten Einzelabschlüsse überprüft. Kontrollen im Rahmen des Konsolidierungsprozesses, wie beispielsweise der Schulden- oder der Aufwands- und Ertragskonsolidierung, erfolgen manuell. Eventuelle Mängel werden korrigiert und an die Tochtergesellschaften zurück berichtet. Die eingesetzten Finanzsysteme sind durch entsprechende Berechtigungskonzepte und Zugangsbeschränkungen vor Missbrauch geschützt. Zugriffsberechtigungen werden regelmäßig überprüft und gegebenenfalls aktualisiert.



## Allgemeine wirtschaftliche Risiken und Branchenrisiken

### *Politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen*

Unser Geschäftsumfeld wird durch die regionalen wie auch die weltweiten konjunkturellen Bedingungen beeinflusst. Die Weltwirtschaft hat im Verlauf des Jahres 2011 spürbar an Dynamik verloren. Insbesondere die Zuspitzung der Schuldenkrise im Euroraum, der kräftige Anstieg des Ölpreises im Zusammenhang mit den politischen Veränderungen in den arabischen Ländern und die Auswirkungen des Erdbebens in Japan sorgten für erhebliche Unsicherheiten, die die wirtschaftliche Entwicklung drosselten. Das Welt-Bruttoinlandsprodukt weist in 2011 nur einen Zuwachs von etwa 2,6 % auf (nach einem Anstieg von circa 3,7 % in 2010).

Trotz der eher verhaltenen Entwicklung der Weltwirtschaft konnte SÜSS MicroTec (wie auch andere Unternehmen der Halbleiterbranche) den Umsatz in 2011 deutlich ausweiten, was jedoch teilweise auf den hohen Auftragsbestand zum Jahresbeginn zurückzuführen ist. Der höchste Umsatzanteil wurde wieder in den Regionen China, Taiwan und sonstiges Asien erzielt. Auch die Umsätze mit japanischen Kunden haben sich – entgegen der Erwartungen – deutlich erhöht. Besonders positiv haben sich in 2011 die Umsätze mit Kunden in Nordamerika entwickelt: hier konnte ein Umsatzzuwachs von etwa knapp 55 % erreicht werden. Die Verlangsamung der wirtschaftlichen Entwicklung machte sich jedoch insbesondere in der zweiten Jahreshälfte bemerkbar, in der ein deutlicher Rückgang des Auftragseingangs zu verzeichnen war.

### *Zyklische Marktschwankungen und Marktentwicklung*

Die schwierige Einschätzbarkeit der kurz- und mittelfristigen Marktentwicklung gehört unverändert zu den größten Risiken des Unternehmens. Insbesondere die Halbleiterindustrie, die zu unseren Absatzmärkten zählt, ist von starken Marktzyklen geprägt. Diesen Risiken begegnen wir durch schlanke Strukturen, die bei schwacher Geschäftsentwicklung zügig angepasst und gegebenenfalls durch Outsourcing ergänzt werden können.

### *Marktpositionierung*

Neue technologische Entwicklungen des Wettbewerbs könnten Teile des Produktportfolios und damit Teile des Potenzials ungeplant obsolet machen, wenn neue Technologien schnellere, effizientere oder günstigere Lösungen für das gleiche Problem bieten würden. Diesem Risiko begegnen wir vor allem durch gezielte Forschung und Entwicklung und durch einen laufenden Abgleich der Entwicklungsplanung mit den wesentlichen Kunden.

### *Abhängigkeit von einzelnen „Know How“-Trägern*

In einzelnen Bereichen ist das Unternehmen von dem Wissen einzelner Mitarbeiter abhängig, vor allem im Bereich der Forschung und Entwicklung. Eine Nichtverfügbarkeit dieser Mitarbeiter für die Gruppe stellt ein entsprechendes Risiko dar, das durch interne Dokumentationspflichten kontrolliert wird.

### Betriebliche Risiken

#### *Vermögens- und Ertragslage*

Angesichts der äußerst positiven Entwicklung des Bestands an flüssigen Mitteln, der hohen Eigenkapitalquote und der schlanken Kostenstruktur sind die Risiken, die sich für SÜSS MicroTec aus der aktuellen Vermögens- und Ertragslage ergeben könnten, überschaubar. Der Break-Even-Umsatz liegt auch in 2011 wieder deutlich unter dem tatsächlich erwirtschafteten Umsatz. Unter Berücksichtigung des zum Jahresende 2011 vorhandenen Auftragsbestands gehen wir davon aus, dass wir in 2012 wieder einen Umsatz deutlich über dem Break-Even-Umsatz erwirtschaften werden.

Zum 31.12.2011 weist SÜSS MicroTec einen Goodwill in Höhe von rund 13,6 Mio. € aus, der ausschließlich dem Bereich Lithografie zuzuordnen ist. Der Bereich Lithografie erwirtschaftet mehr als die Hälfte des Konzernumsatzes und trägt ganz wesentlich zu einem positiven Konzernergebnis bei. Für 2012 erwarten wir zwar rückläufige Umsätze in diesem Segment. Der Bereich Lithografie wird jedoch auch im nächsten Jahr mehr als die Hälfte des gesamten Konzernumsatzes erwirtschaften und weiterhin sehr profitabel sein. Für Wertminderungen im Segment Lithografie sehen wir daher keine Anzeichen.

#### *Preisdruck*

Im jetzigen Marktumfeld besteht unverändert ein deutlicher Preisdruck. Dieser beinhaltet das Risiko, dass auch bei sich erholenden Märkten ursprüngliche Zielverkaufspreise nicht mehr erzielt werden können. Diesem Risiko begegnen wir mit einer stetigen Preispolitik. So verzichten wir bei unattraktiven Konditionen auch auf Aufträge, um bei sich erholenden Märkten den Kunden gegenüber eine konsistente Preisgestaltung zu gewährleisten.

### *Rechtliche Risiken, insbesondere Haftungsrisiken*

Die Produkte von SÜSS MicroTec werden durch ein umfassendes Risiko- und Qualitätsmanagement regelmäßig analysiert, kontrolliert und optimiert. Auf Grund des Einsatzes der Produkte im Produktionsumfeld von Unternehmen mit wachsenden Anforderungen an die Produktqualität kann sich das Haftungsrisiko für SÜSS MicroTec erhöhen. SÜSS MicroTec verfügt, neben anderen Versicherungen, über eine Produkthaftpflichtversicherung für die Gruppe, die das potenzielle Risiko soweit möglich limitiert.

### *Änderungen der Konzernstruktur*

In 2011 hat sich die Konzernstruktur nur unwesentlich verändert. Im Juli 2011 wurde die SUSS MicroTec Asia Company Ltd., Bangkok (Thailand) liquidiert und zum 28. Juli 2011 entkonsolidiert. Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft wurde bereits in 2009 stillgelegt.

Im Oktober 2011 hat SÜSS MicroTec sein Maskengeschäft – die Herstellung von Fotomasken durch die SUSS MicroTec Precision Photomask Inc. – verkauft. Dieser Schritt unterstützt das Geschäft von SÜSS MicroTec mit Fotomasken-Equipment, indem mögliche Konkurrenzsituationen mit Kunden ausgeschlossen werden. Der Verkauf erfolgte als Asset Deal, so dass die Gesellschaft SUSS MicroTec Precision Photomask Inc. zwar weiterhin zum Konzern gehört, jedoch nun keinen Geschäftsbetrieb mehr beinhaltet.

### *Verlagerung des Substrat Bonder Bereichs nach Deutschland*

Die Verlagerung des im US-amerikanischen Waterbury (Vermont) ansässigen Geschäftsbereichs Substrat Bonder nach Deutschland wurde im April 2011 abgeschlossen. SÜSS MicroTec war darauf vorbereitet, auftretenden Schwierigkeiten zu begegnen und hat verschiedene Risiken identifiziert, die den Umzug, die Integration des Bonder-Bereichs in die Suss MicroTec Lithography GmbH und die Neu-Ordnung des Vertriebs negativ beeinflussen könnten. Nachdem die Verlagerung abgeschlossen und die Bonder-Produktion in Sternenfels eingerichtet war, hat sich herausgestellt, dass die befürchteten Schwierigkeiten in weit geringerem Maß eingetreten sind als erwartet.

Für eine erfolgreiche Verlagerung und Fortführung des Substrat Bonder Bereichs war SÜSS MicroTec darauf angewiesen, dass das bei den nordamerikanischen Mitarbeitern vorhandene Know-How bewahrt und auf die nun in Sternenfels bzw. Kalifornien tätigen Mitarbeiter übertragen wird. Erfreulicherweise konnte SÜSS MicroTec mehrere Mitarbeiter aus Waterbury für einen Zeitraum von 6 bis 15 Monaten in Sternenfels weiter beschäftigen. Die Einarbeitung der ca. 50 neu eingestellten Mitarbeiter in Sternenfels und der Erfahrungsaustausch mit den US-Kollegen haben hervorragend funktioniert, so dass kein Know-How verloren ging. Ein Mitarbeiter des ehemaligen Standorts Waterbury wurde inzwischen unbefristet bei der Süss MicroTec Lithography GmbH in Sternenfels angestellt. Die Neuorganisation der Produktion, der Forschung und Entwicklung sowie des Produktmanagements für den Bereich Bonder konnte somit erfolgreich abgeschlossen werden.

SÜSS MicroTec hat (per Ad-Hoc-Mitteilung vom 10. Juni 2010) bereits frühzeitig über die Details und den Zeitplan der Verlagerung des Substrat Bonder Bereichs und der nordamerikanischen Vertriebs- und Serviceorganisation informiert. Sowohl Kunden als auch Lieferanten des Substrat Bonder Bereichs hatten damit sehr lange Gelegenheit, sich auf die sich verändernden Verhältnisse vorzubereiten. Zu zahlreichen US-Lieferanten wurden die Geschäftsbeziehungen aufrechterhalten und funktionieren heute – nach Überwindung einiger Anlaufschwierigkeiten – reibungslos. Zusätzlich wurden neue Lieferbeziehungen mit europäischen Lieferanten eingerichtet. Leider haben der Umzug und die Neuorganisation der Lieferbeziehungen zwischenzeitlich zu verlängerten Lieferzeiten auf Kundenseite geführt. Diese so nicht erwarteten langen Lieferzeiten verursachten einen Teil des Umsatzrückgangs im Substrat Bonder Bereich.

In den kommenden Jahren erwartet SÜSS MicroTec ein deutliches Wachstum im Bereich Substrat Bonder. Nach der erfolgreichen Integration des Substrat Bonder Bereichs in die Süss MicroTec Lithography GmbH und der Neuausrichtung der Lieferantenbeziehungen sieht sich SÜSS MicroTec in diesem Bereich sehr gut aufgestellt.

## Finanzmarktrisiken

### *Kreditrisiken*

Ein Kreditrisiko ist der unerwartete Verlust an Zahlungsmitteln oder Erträgen. Dieser tritt ein, wenn der Kunde nicht in der Lage ist, seinen Verpflichtungen innerhalb der Fälligkeit nachzukommen, oder die als Sicherheit dienenden Vermögenswerte an Wert verlieren. Das Unternehmen hat eine konzernweit gültige Richtlinie zum Thema „Credit Assessment“ implementiert. Diese Richtlinie legt für die einzelnen Vertriebsseinheiten des Unternehmens fest, welche Zahlungsbedingungen und Zahlungsabsicherungen im Einzelfall unter Berücksichtigung kunden- und länderspezifischer Aspekte vereinbart werden. Aufträge mit Kunden, die in sog. „Risk Countries“ angesiedelt sind, können demzufolge nur gegen Anzahlung des gesamten Auftragswertes, einer Bankgarantie oder eines Letter of Credit abgewickelt werden. Im Fall von Kunden, die in sog. „Non Risk Countries“ ansässig sind und eine bestimmte Größenordnung überschreiten, wird ein entsprechendes Kundenrating erstellt. Die Ratings beruhen auf den Angaben externer Kreditratingagenturen. Je nach Einstufung des Kunden sind für die Auftragsabwicklung abgestufte Zahlungskonditionen bzw. -absicherungen notwendig.

Vom Bruttobestand der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 18,3 Mio. € (Vorjahr: 16,4 Mio. €) sind zum Bilanzstichtag insgesamt 13,4 Mio. € (Vorjahr: 6,8 Mio. €) der Forderungen weder überfällig noch wertgemindert. Bei diesen Forderungen lagen zum 31. Dezember 2011 keine Anhaltspunkte vor, dass Zahlungsausfälle eintreten werden.

Die Altersstruktur der überfälligen, aber nicht wertgeminderten Forderungen stellt sich zum Bilanzstichtag und zum Vorjahresstichtag wie folgt dar (in T€):

	2011	2010
<b>Altersanalyse der überfälligen Forderungen ohne Wertberichtigung</b>		
1 - 30 Tage	832	2.164
31 - 60 Tage	925	1.645
61 - 90 Tage	1.231	2.211
91 - 180 Tage	1.215	1.606
<b>Überfällige Forderungen ohne Wertberichtigung</b>	<b>4.203</b>	<b>7.626</b>

Insgesamt sind zum Bilanzstichtag 0,8 Mio. € (Vorjahr: 2,0 Mio. €) des Bruttoforderungsbestands überfällig und wertberichtigt. Die Altersstruktur der überfälligen und wertberichtigten Forderungen zum Bilanzstichtag und zum Vorjahresstichtag ist in folgender Tabelle dargestellt

(in T€)	2011	2010
<b>Altersanalyse der überfälligen Forderungen mit Wertberichtigung</b>		
91 - 180 Tage	148	196
181 - 360 Tage	300	1.239
> 360 Tage	302	557
<b>Überfällige Forderungen mit Wertberichtigung</b>	<b>750</b>	<b>1.992</b>

Weitere Informationen zur Bestimmung von Wertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen finden sich im Konzernanhang.

#### *Liquiditätsrisiken*

Zum Jahresende weist der SÜSS MicroTec Konzern einen Net Cash Bestand von 42,0 Mio. € aus (Vorjahr: 34,6 Mio. €). Der Free Cash Flow belief sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 3,5 Mio. € (Vorjahr: 14,1 Mio. €).

Das in 2007 begebene Schuldscheindarlehen in Höhe von 9 Mio. € ist im Dezember 2012 zur Rückzahlung fällig. Aufgrund der aktuell sehr positiven Finanzlage und der positiven Planung für das Jahr 2012 wird SÜSS MicroTec in der Lage sein, den im Dezember 2012 fälligen Betrag aus eigenen Mitteln zu tilgen. Unabhängig davon wird SÜSS MicroTec bei Fälligkeit des Schuldscheindarlehens die zukünftige Finanzierung des Konzerns unter Berücksichtigung der aktuellen Situation beurteilen und eventuell neu ordnen.

Derzeit stellen zwei Banken im Rahmen eines Bankenkonsortiums eine Kreditlinie von 8,0 Mio. €, die zunächst bis zum 31. März 2012 befristet ist. Zusätzlich kann SÜSS MicroTec eine Kreditlinie der DZ-Bank Frankfurt in Höhe von 2,0 Mio. € nutzen, die ebenfalls bis 31. März 2012 befristet ist. Darüber hinaus besteht eine Avallinie in Höhe von 2,5 Mio. € bei einer Versicherungsgesellschaft. Eine weitere Kreditlinie in Höhe von 1,0 Mio. € steht der HamaTech APE GmbH & Co. KG zur Verfügung. Diese Kredit- und Avallinien nutzen wir derzeit, um Anzahlungsbürgschaften im operativen Geschäft zu stellen. Sollte es nicht gelingen, die Kreditlinien des Bankenkonsortiums und der DZ Bank über den 31. März 2012 hinaus zu verlängern, müssten wir zukünftig bei einzelnen Kunden, die auf solche Bürgschaften bestehen, auf Anzahlungen verzichten. Dies wiederum würde die vollständige Vorfinanzierung von Kundenaufträgen bedingen sowie die Wahrscheinlichkeit für Stornierungen von Aufträgen erhöhen.

Für 2012 ist geplant, Kreditverträge mit einem auf drei Banken ausgelegten Bankenkonsortium unter Führung der BayernLB abzuschließen, um die für die Unterlegung von Anzahlungsbürgschaften notwendigen Kreditlinien auch weiterhin zur Verfügung zu haben. Die Verhandlungen sind bereits weit fortgeschritten. Die neuen Verträge werden voraussichtlich Ende März 2012 abgeschlossen werden. Wir gehen fest davon aus, dass wir damit auch zukünftig alle erforderlichen Anzahlungsbürgschaften stellen können.

Die Minimierung der Abhängigkeit, insbesondere von kurzfristigem Fremdkapital, soll ein potenzielles Finanzierungsrisiko gering halten. Wir begegnen diesem Risiko vor allem durch das Ziel, mit entsprechenden Cash Flows auch aus der Optimierung des Working Capital den Anteil des Fremdkapitals auf niedrigem Niveau zu halten. Weitere Einzelheiten zur Liquiditätssituation der Gesellschaft finden sich unter Textziffer (24) des Konzernanhangs.

#### *Marktpreisrisiken*

Marktpreisschwankungen können für das Unternehmen signifikante Cash Flow- sowie Gewinnrisiken zur Folge haben. Änderungen der Fremdwährungskurse und der Zinssätze beeinflussen sowohl das weltweite operative Geschäft als auch die Investitions- und Finanzierungsalternativen.

SÜSS MicroTec ist im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit auf Grund der internationalen Ausrichtung Fremdwährungsrisiken ausgesetzt. Die Währungssicherung erfolgt auf Basis bestehender Fremdwährungsaufträge. Für Aufträge, die binnen 3 bzw. 6 Monaten abgearbeitet werden, beträgt die Sicherungsquote rund 65 % bzw. 45 %. Als Sicherungsinstrumente werden Devisentermingeschäfte genutzt. Für weitere Einzelheiten verweisen wir auf den Konzernanhang unter Textziffer (29).

Die Fremdwährungssensitivität wird durch die Aggregation der Fremdwährungspositionen des operativen Geschäfts und des Konzern-Treasury ermittelt. Dabei werden die Fremdwährungsrisiken durch Simulation einer 10-%igen Abwertung aller Fremdwährungen gegenüber dem Euro berechnet. Diese simulierte Abwertung hätte zum Bilanzstichtag zu einer Erhöhung der Euro-Gegenwerte in Höhe von T€ 53 (Vorjahr: Reduzierung um T€ 501) und einer entsprechenden Erhöhung (Vorjahr: Verringerung) des Jahresergebnisses geführt.

Die folgenden Tabellen zeigen die Zusammensetzung des Fremdwährungsexposures und die Auswirkungen auf das Jahresergebnis zum Bilanzstichtag und zum Vorjahresstichtag (in T€):

	2011		
	USD	JPY	Summe
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.843	6	1.849
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.671	0	1.671
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.390	-108	-1.498
Kundenanzahlungen	-2.602	0	-2.602
<b>Netto-Exposure</b>	<b>-478</b>	<b>-102</b>	<b>-580</b>
Effekt auf das Jahresergebnis bei 10%iger Aufwertung des Euro	43	9	53

	2010		
	USD	JPY	Summe
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5.573	374	5.947
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.694	1.344	5.038
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-683	-58	-741
Kundenanzahlungen	-4.729	0	-4.729
<b>Netto-Exposure</b>	<b>3.855</b>	<b>1.660</b>	<b>5.515</b>
Effekt auf das Jahresergebnis bei 10%iger Aufwertung des Euro	-350	-151	-501

Das Zinsänderungsrisiko des Unternehmens ist begrenzt, da auf die im Geschäftsjahr 2007 platzierten variablen Teile des Schuldscheindarlehens laufzeitkongruente Zinsswaps gelegt wurden. Ursprünglich variable Konditionen wurden dadurch in fixe Konditionen eingetauscht. Auch das variabel verzinsten Darlehen im Zusammenhang mit der Grundstücksfinanzierung Sternenfels wurde mit einem laufzeitkongruenten Zinsswap gesichert.

Alle weiteren wesentlichen Finanzschulden von SÜSS basieren auf Darlehensverträgen mit festen Zinssätzen und unterliegen keinem Zinsänderungsrisiko.

Das Unternehmen hält festverzinsliche Unternehmens- und Staatsanleihen, die zu jeder Zeit über eine Bank oder über die Börse veräußert werden können. Der Kurs ist unter anderem auch beeinflusst durch das aktuelle Marktzinsniveau. Sollte das Unternehmen Wertpapiere vor dem Ende der Laufzeit veräußern (z. B. zur Deckung eines ungeplanten Liquiditätsbedarfs, der nicht durch freie Mittel gedeckt werden kann), könnten ungeplante Kursverluste entstehen.

### Gesamtrisiko

Im Konzern wurden im Geschäftsjahr 2011 keine bestandsgefährdenden Risiken identifiziert. Der Fortbestand des Unternehmens war unter Substanz- und Liquiditätsgesichtspunkten zu keiner Zeit gefährdet.



## **Prognosebericht**

Die volkswirtschaftlichen Vorgaben für das abgelaufene Geschäftsjahr waren insgesamt sehr positiv. Nach einem starken Wachstumsjahr 2010 verzeichnete auch das Jahr 2011 zunächst einen guten Start. Die konjunkturellen Erwartungen trübten sich allerdings erstmals mit der Japan-Krise im März 2011 ein. Die schwere Naturkatastrophe hatte jedoch weitaus weniger Einfluss auf die Weltwirtschaft, als man es anfangs erwartet hatte. Auch die Schuldenkrise in Europa hatte zunächst wenige Auswirkungen auf die Märkte. Als jedoch im Sommer 2011 zu dem Schuldenproblem in Griechenland auch noch politische Turbulenzen in Italien sowie heftige Diskussionen über die Ausweitungen der Schuldenobergrenze in den USA hinzukamen, traf dies nun auch die bis dahin vergleichsweise stabilen Aktien- und Anleihemärkte. Dieses Zusammenspiel zeigt, dass in der aktuellen Schuldenkrise der Politikfaktor eine große Rolle spielt, dieser jedoch als unberechenbar angesehen wird und somit starke Auswirkungen auf die konjunkturellen Erwartungen hat. So hat das bewegte Börsenjahr 2011 schlussendlich überwiegend mit Verlusten geschlossen, der Deutsche Leitindex DAX verzeichnete beispielsweise ein Minus von 16 % gegenüber dem Vorjahr.

Wie das Wirtschafts- und Börsenjahr 2012 aussehen wird, darüber gibt es bei den Experten folgende Ansichten. In seiner Jahresprojektion für 2012 rechnet das deutsche Wirtschaftsforschungsinstitut rwi in Essen laut einer Meldung aus Dezember 2011 mit einer Zunahme des Bruttoinlandsproduktes um 0,6 % nach 3,0 % in 2011, für die gesamte Weltwirtschaft rechnet man laut Herbstgutachten der deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute für 2012 mit einem Wachstum von rund 2,5 % nach 2,6 % in 2011. Zu ähnlichen Ergebnisse kommt auch die OECD, sie erwartet für Deutschland ein Wachstum von 0,6 % nach 3,0 % im Vorjahr. Der Internationale Währungsfonds rechnete in seinem „World Economic Survey“ von September 2011 noch mit einem globalen Wirtschaftswachstum von rund 4 % für 2012, sagt aber auch sehr deutlich, dass die Wahrscheinlichkeit eines realen BIP Wachstums von unter 2 % in der zweiten Jahreshälfte 2011 deutlich zugenommen hat. Für den Euro-Raum wird ein Wachstum von lediglich 1,1 % und für Deutschland ein Wachstum von 1,3 % erwartet. Die Abschwächung des globalen Wachstums dürfte sich auch negativ auf die Entwicklung an den Aktien- und Bondmärkten auswirken.

Die im dritten und vierten Quartal 2011 rückläufigen Auftragszahlen für Halbleiter-Equipment im Front- und Backend wurden durch die zuletzt negative Stimmung auf den Weltmärkten ausgelöst. Vor dem Hintergrund der allgemeinen Unsicherheit bzw. der Erwartung eines negativen Halbleiterwachstums seitens der Markt- und Branchenbeobachter, geht SÜSS MicroTec für das Jahr 2012 von einer rückläufigen Auftragseingangs-, Umsatz- und Ergebnisentwicklung aus.

In diesem Prognosebericht gehen wir kurz erläuternd auf die exogenen und endogenen Faktoren ein, die wir ebenso wie führende Branchenbeobachter als maßgeblich für die weitere Entwicklung unseres Unternehmens ansehen.

### **Halbleiterindustrie**

Die erste Jahreshälfte 2011 war von kräftigem Wachstum in der Halbleiterindustrie geprägt. Hier ist jedoch zu berücksichtigen, dass ein Teil des Wachstums dem hohen Auftragsbestand zum Ende des Geschäftsjahres 2010 geschuldet ist. In der zweiten Jahreshälfte 2011 haben die verschlechterten makroökonomischen Rahmenbedingungen Auswirkungen auf die Auftragseingänge in der Halbleiterindustrie gezeigt. Das Marktforschungsinstitut Gartner erwartet ein weltweites Wachstum der Halbleiterindustrie von 0,9 % in 2011. Dies würde einem Gesamtmarktvolumen von rund 302 Mrd. USD entsprechen. Für Europa übersetzt sich dies laut ZVEI in ein stagnierendes Umsatzvolumen im Halbleiterbereich.

Für 2012 wurden die Schätzungen zum Jahresende nach unten korrigiert, so erwartet Gartner für das kommende Geschäftsjahr ein Wachstum von rund 2,2 %. Damit wurden die eigenen Erwartungen, die noch im dritten Quartal bei 4,6 % Wachstum lagen, deutlich nach unten angepasst. Als Grund werden auch hier die verschlechterten makroökonomischen Rahmenbedingungen, die mit einer allgemeinen Verunsicherung der Endverbraucher und auch der Unternehmen einhergehen, genannt.

### **Halbleiter-Equipment-Industrie**

Laut dem Marktforschungsinstitut Gartner verzeichnete die Halbleiter-Equipment-Industrie in 2011 ein Marktwachstum von knapp 14 %. Für 2012 wird dagegen ein Rückgang um 19,5 % bei Halbleiter-Equipment Herstellern erwartet. Als Begründung nennt Gartner die generell verschlechterten makroökonomischen Rahmenbedingungen sowie die hohen Bestände bei den verschiedenen Kunden. Die Nachfrage sollte sich jedoch ab Jahresmitte wieder erholen und für 2013 erwartet man erneut ein Wachstum von mehr als 19 %.

Für den Spezialbereich Verpackung und Montage erwartet Gartner für 2012 einen allgemeinen Rückgang der Umsätze, wobei die Equipmenthersteller für sogenannte „Advanced Packaging Anwendungen“ einen schwächeren Rückgang sehen sollten. Das Marktforschungsinstitut SEMI Industry Research and Statistics erwartet im Spezialbereich Verpackung und Montage nach einem Rückgang von 12,5 % in 2011, einen weiteren Rückgang um rund 10 % in 2012 und ein Wachstum von knapp 7 % in 2013.

## Erwartete Entwicklung in den Hauptmärkten

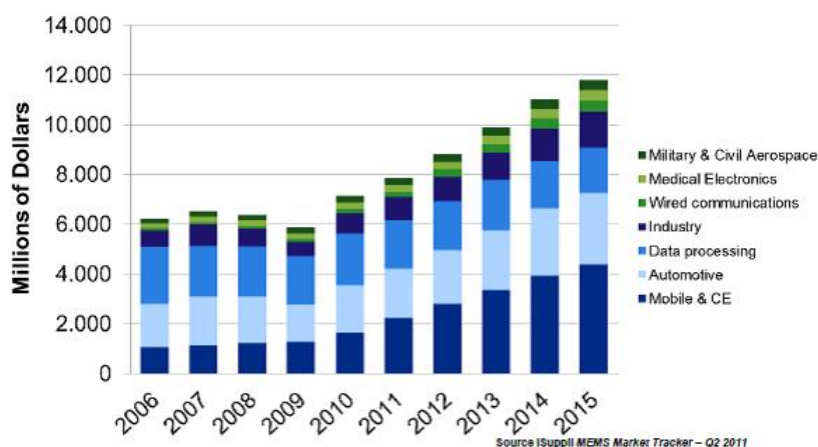
### Markt für Mikrosystemtechnik

Der Markt für Mikrosystemtechnik (MEMS) hat nach einem starken Jahr 2010 ein weiteres Wachstumsjahr vollendet. Für den gesamten MEMS Markt erwartet iSuppli ein Wachstum in 2011 von rund 10 %, Yole Developpement, ein französisches Marktforschungsinstitut, erwartet für den gleichen Zeitraum sogar ein Wachstum von 16 %. Bei einem Betrachtungszeitraum bis 2015 sind die Erwartungen der verschiedenen Marktforschungsinstitute sehr ähnlich, hier wird von einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von mehr als 10 % ausgegangen. Hauptgrund hierfür sind vor allem die Anwendungen im stark wachsenden Segment Smartphones sowie in den Segmenten Konsumelektronik und Automotive.

So ist beispielsweise der Markt für MEMS im Bereich Konsumelektronik und mobile Anwendungen nach einem Wachstum von 27 % in 2010, im abgelaufenen Geschäftsjahr um 37 % gewachsen. Bis 2015 erwartet ein Analyst von Techeye in diesem Bereich ein durchschnittliches jährliches Wachstum von mehr als 22 %. Neuere Anwendungen, beispielsweise in der Medizintechnik, erreichen bereits hohe Wachstumsraten, jedoch ist das Gesamtvolumen hier noch vergleichsweise gering.

Bei der Interpretation der Marktzahlen ist allerdings zu berücksichtigen, dass der Equipment-Markt in diesem Bereich weniger schnell wächst, als der MEMS-Markt selbst, da durch die gesteigerte Produktivität der Fertigungssysteme eine stets höhere Anzahl an MEMS-Bauteilen pro Maschine gefertigt werden kann.

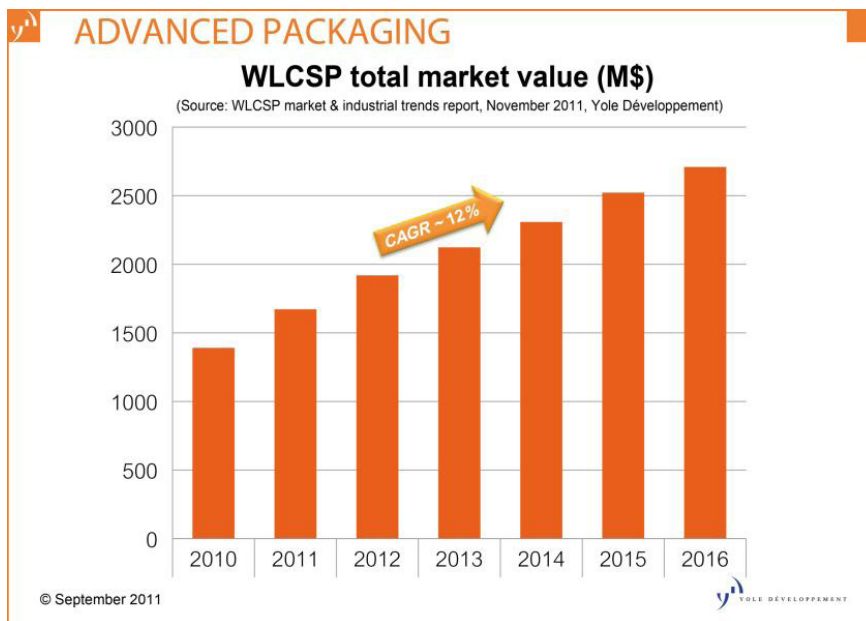
MEMS Market by Application, 2006-2015



Quelle: iSuppli MEMS Market Tracker Q2 2011

### Advanced Packaging und 3D-Integration

Für das Wafer Level Packaging (Advanced Packaging) prognostizieren die Forscher von Yole Développement für den Zeitraum von 2010 bis 2016 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von rund 12 %. Dies ist jedoch eine Verringerung gegenüber der Schätzung aus 2010, in welcher noch ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 22 % erwartet wurde.



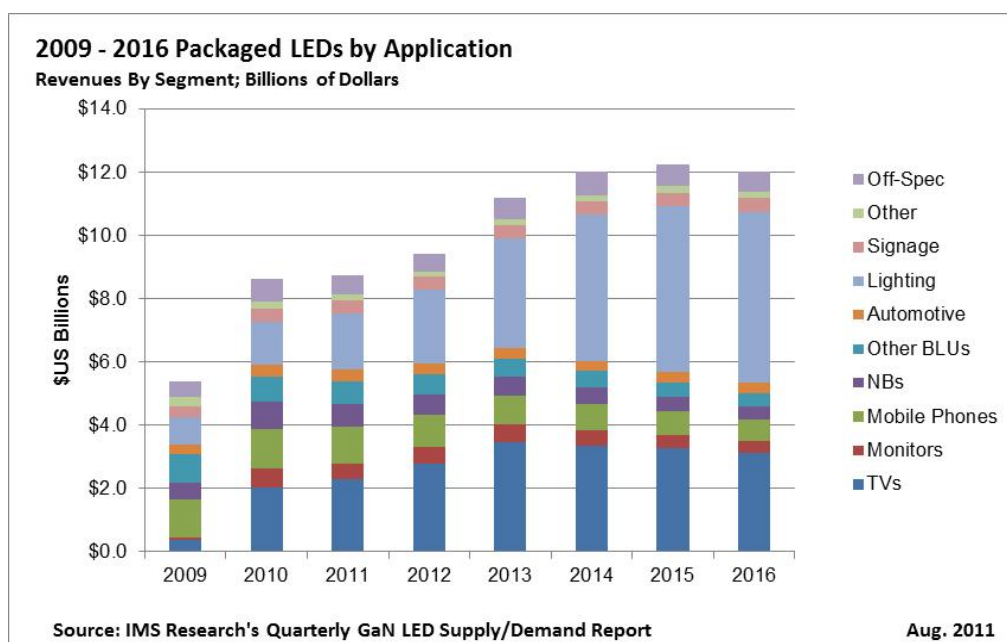
Quelle: Yole Développement September, 2011

Bei der 3D Integration sehen die erwarteten Wachstumsraten deutlich größer aus. Laut einer Studie des Marktforschungsinstituts Yole Développement soll der Equipment Markt für temporäres Wafer Bonden bis 2016 ein Volumen von rund 300 Mio. USD erreichen, der Equipment Markt für permanentes Bonden soll im gleichen Zeitraum auf ein Volumen von mehr als 500 Mio. USD anwachsen. Ein großer Teil dieses Wachstums wird durch die 3D Integration getrieben werden.

### Verbindungshalbleiter (LED)

SÜSS MicroTec konzentriert sich im Markt für Verbindungshalbleiter auf das Wachstumssegment LEDs (Leuchtdioden) und adressiert mit seinen Produktlösungen insbesondere Hersteller von höherwertigen Leuchtdioden, sogenannten High-Brightness (HB)- und Ultra-High-Brightness (UHB)-LEDs. SÜSS MicroTec beteiligt sich aktiv an den neuesten Technologiegenerationen, die insbesondere Dünnwaferhandling erfordern.

Gemäß den Schätzungen von IMSresearch ist der Markt für „packaged“ LEDs in 2011 um rund 6 % geschrumpft. Für 2012 wird ein erneutes Wachstum in Höhe von 5 % erwartet, wobei jedoch die Marktgröße von 2010 noch nicht wieder erreicht werden dürfte. Auch für die kommenden Jahre bis 2015 wird ein positives Wachstum prognostiziert, insbesondere für die Jahre 2013 und 2014 wird ein Zuwachs von jeweils mehr als 10 % vorhergesagt. Grund hierfür ist die verstärkte Marktdurchdringung des Beleuchtungssegments mit LEDs, die durch die fallenden Verkaufspreise erwartet wird. Die Analysten von IMSresearch erwarten eine Steigerung des Anteils der allgemeinen Beleuchtung am gesamten LED Markt von 21 % in 2011 auf mehr als 49 % in 2016. Damit dürfte die allgemeine Beleuchtung den Anteil des heute größten Segments - dem TV Geschäft - bereits ab 2014 deutlich überschreiten.



Quelle: IMS Research, August 2011

## **Endogene Indikatoren**

Neben dem Zustand der Märkte ist für unseren Erfolg auch das Innovationspotenzial unseres Produktangebotes entscheidend. Das Unternehmen ist auch im Geschäftsjahr 2011 weitere Entwicklungskooperationen mit namhaften Partnern aus Industrie und Forschung eingegangen. Im Januar 2011 hat SÜSS MicroTec die strategische Zusammenarbeit mit der NanoScale Science & Technology Fakultät (CNF) der nordamerikanischen Cornell-Universität bekannt gegeben. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden Cornell - Mitarbeiter an bereits existierenden und neuen Lithografie-Systemen von SÜSS MicroTec, darunter innovative Aufrüstsätze für Mask Aligner sowie ein Sprühbelacker der Gamma – Serie, Forschungsarbeiten durchführen. Darüber hinaus ist SÜSS MicroTec mit dem Centre for NanoHealth (CNH) der Universität Swansea eine Zusammenarbeit eingegangen, um zukunftsfähige Technologien zu entwickeln und zu verbessern. Im Dezember 2011 wurde die Zusammenarbeit mit der Brewer Science Inc. auf dem Gebiet der Handhabung von gedünnten Wafern und dem temporären Bonden von Wafern bekannt gegeben. Diese Zusammenarbeit ist besonders vor dem Hintergrund des erwarteten Wachstums im Bereich 3D Integration von großer Bedeutung.

## **Gesamtaussage zur voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns**

Im Geschäftsbericht 2010 haben wir an dieser Stelle berichtet, dass die Turbulenzen an den internationalen Finanzmärkten zum damaligen Zeitpunkt keine negativen Auswirkungen auf die Nachfrageentwicklung hatten. Diese Situation hat sich im Vergleich zum Vorjahr spürbar verändert. Die Verunsicherung bei den Verbrauchern hat in der zweiten Jahreshälfte 2011 zu einer deutlichen Eintrübung der Konjunkturaussichten geführt. Darüber hinaus haben die politischen Akteure bis heute keine praktikable Lösung der sich immer weiter zuspitzenden Schuldenproblematik in Europa präsentiert. Vor diesem Hintergrund sehen unsere Prognosen für 2012 dennoch verhalten optimistisch aus, denn abgesehen von den makroökonomischen Gegebenheiten sehen wir, dass die Trends, die das Geschäft von SÜSS MicroTec treiben, weiterhin intakt sind.

Insgesamt rechnen wir für das Geschäftsjahr 2012 mit einem Umsatz von mehr als 145 Mio. € und einer EBIT-Marge zwischen 5 % und 10 % vom Umsatz. Der freie Cashflow kann aus heutiger Sicht einen mittleren einstelligen Millionenbetrag erreichen.

Entwickeln sich die von uns adressierten Märkte in der oben beschriebenen Form und stabilisieren sich die makroökonomischen und politischen Rahmenbedingungen, gehen wir für 2013 von erneut steigenden Auftragseingängen und Umsätzen aus. Wir bestätigen erneut das Ziel, eine EBIT-Marge zwischen 10 % und 15 % zu erwirtschaften. Am Ziel, das organische Wachstum unseres Basisgeschäfts ohne zusätzliche Fremdmittel bestreiten zu können, halten wir weiterhin fest.

### **Vorausschauende Aussagen**

Dieser Geschäftsbericht enthält Angaben und Prognosen, die sich auf zukünftige Entwicklungen des SÜSS MicroTec-Konzerns und seiner Gesellschaften beziehen. Die Prognosen stellen Einschätzungen dar, die wir auf Basis aller uns zum jetzigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen haben. Sollten die den Prognosen zu Grunde gelegten Annahmen nicht eintreffen oder Risiken – wie die im Risikobericht angesprochenen – eintreten, so können die tatsächlichen Ergebnisse von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen.

Garching, 12. März 2012

Der Vorstand

Frank Averdung  
Vorstandsvorsitzender

Michael Knopp  
Finanzvorstand





## Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss --bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang-- unter Einbeziehung der Buchführung der Süss MicroTec AG, Garching, und ihren Bericht über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung des Vorstands der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Vorstands sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

München, den 12. März 2012

KPMG AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Renner  
Wirtschaftsprüfer

Dr. Rüttler  
Wirtschaftsprüfer



